

第46期定時株主総会



東京エレクトロン株式会社
2009年6月19日



報告事項

- 第46期成果報告
- 第46期配当
- 第47期業績見通し
- 事業環境の変化
- 中期事業戦略

第46期成果報告と業績見通し

代表取締役会長 東 哲郎



第46期成果報告



第46期 連結業績ハイライト

世界的景況悪化の中、通期で最終黒字を確保

固定費	400億円削減(前期比)
営業利益(率)	147億円(2.9%)
当期純利益(率)	75億円(1.5%)

財務体質のさらなる改善

有利子負債 322億円減少(前期比)

継続的キャッシュの創出

営業キャッシュ・フロー 810億円創出
現預金残高(下記参照) 65億円増加(前期比)

現預金：現金及び現金同等物に、預入期間3ヶ月超の定期預金及び譲渡性預金を加えたもの



第46期 連結業績ハイライト

世界的景況悪化の中、通期で最終黒字を確保

固定費	400億円削減(前期比)
営業利益(率)	147億円(2.9%)
当期純利益(率)	75億円(1.5%)

財務体質のさらなる改善

有利子負債	322億円減少(前期比)
-------	--------------

継続的キャッシュの創出

営業キャッシュ・フロー	810億円創出
現預金残高(下記参照)	65億円増加(前期比)

現預金：現金及び現金同等物に、預入期間3ヶ月超の定期預金及び譲渡性預金を加えたもの



連結損益計算書

(単位:億円)

	連結				
	第45期	(%)	第46期	(%)	増減率
売上高	9,060	100.0	5,080	100.0	△43.9%
営業利益	1,684	18.6	147	2.9	△91.3%
経常利益	1,727	19.1	205	4.0	△88.1%
税前利益	1,692	18.7	96	1.9	△94.3%
当期純利益	1,062	11.7	75	1.5	△92.9%

第46期 連結業績ハイライト

世界的景況悪化の中、通期で最終黒字を確保

固定費	400億円削減(前期比)
営業利益(率)	147億円(2.9%)
当期純利益(率)	75億円(1.5%)

財務体質のさらなる改善

有利子負債 322億円減少(前期比)

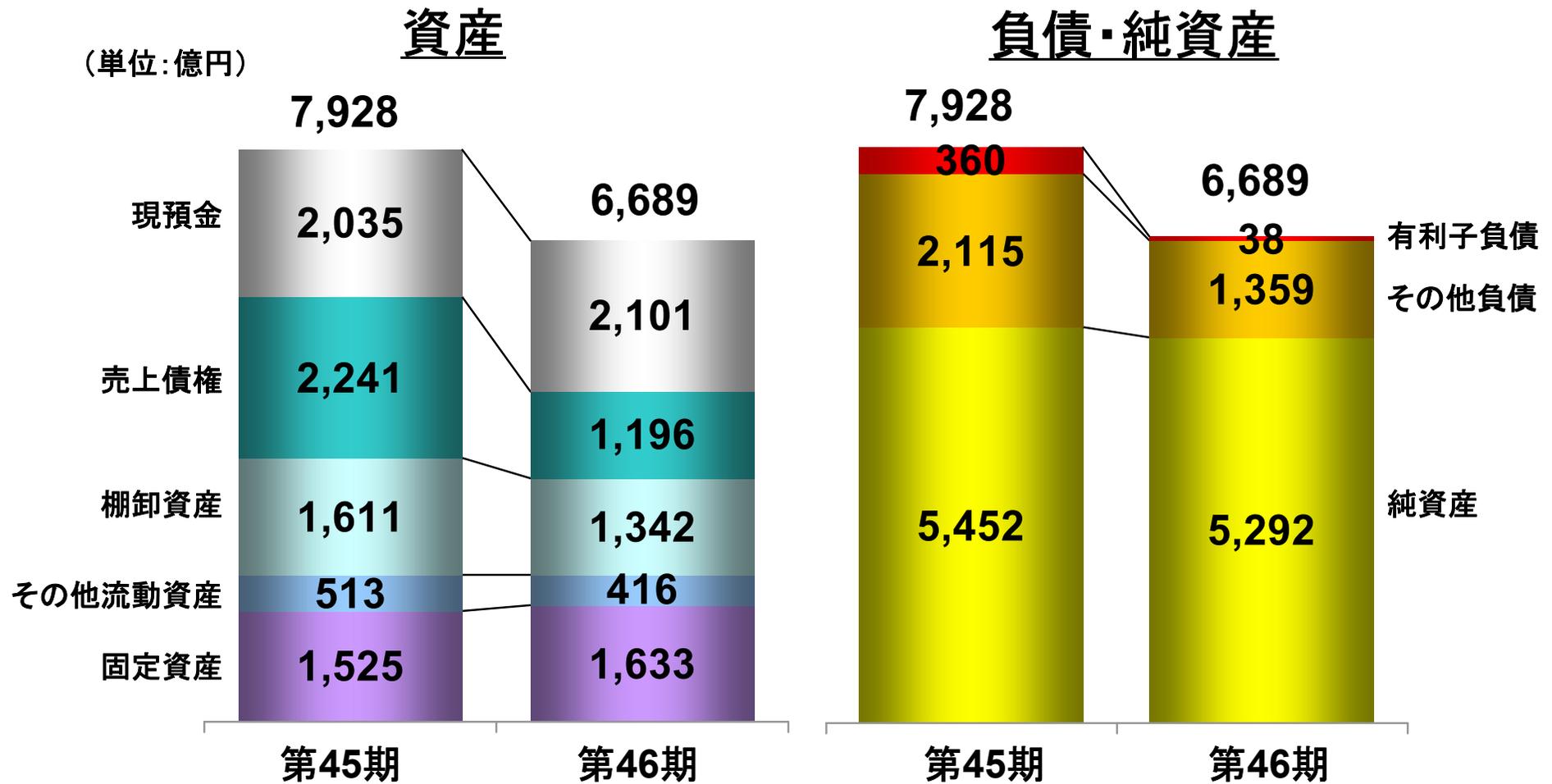
継続的キャッシュの創出

営業キャッシュ・フロー 810億円創出
現預金残高(下記参照) 65億円増加(前期比)

現預金：現金及び現金同等物に、預入期間3ヶ月超の定期預金及び譲渡性預金を加えたもの



連結貸借対照表

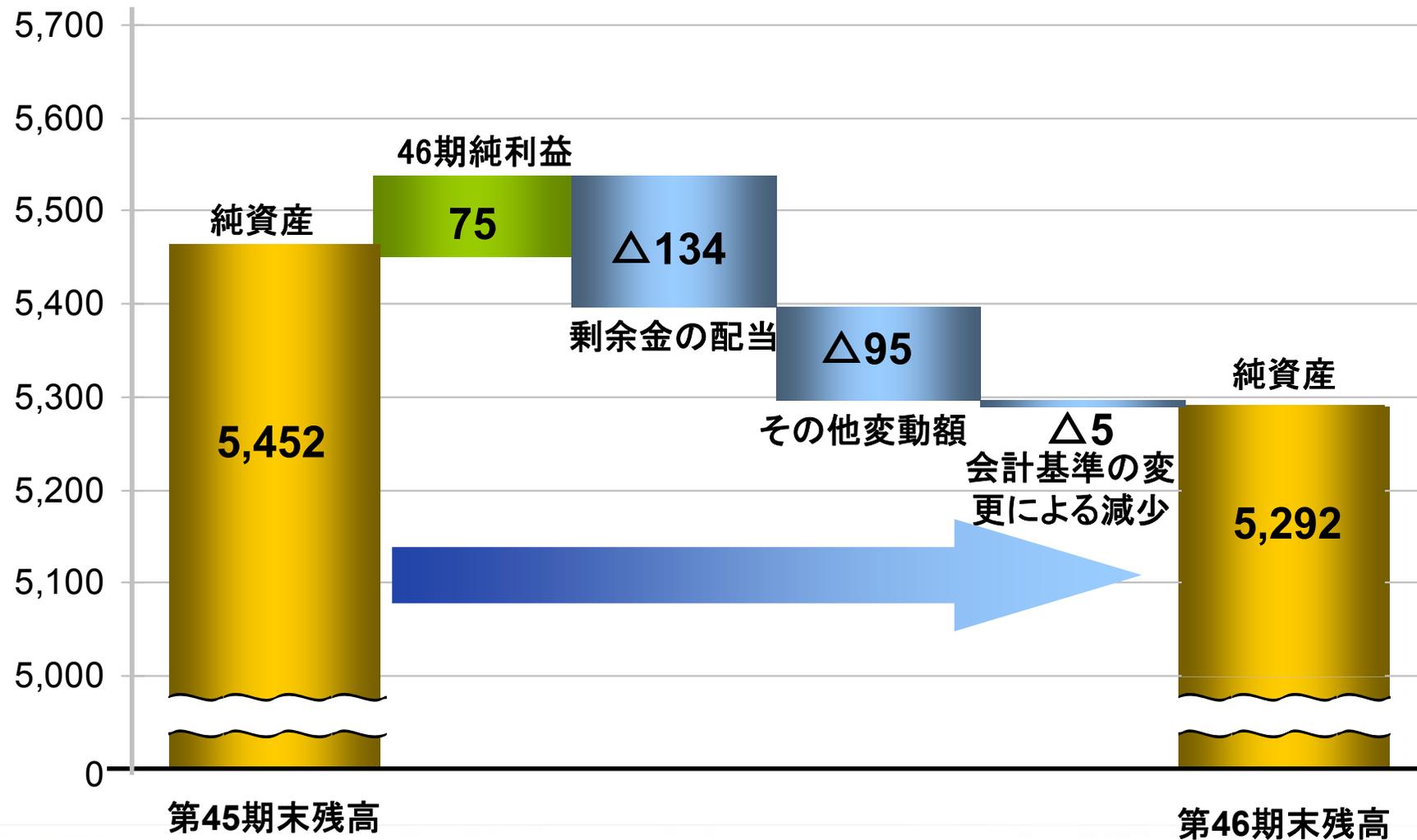


現預金: 現金及び預金と有価証券に含まれる譲渡性預金を加えたもの



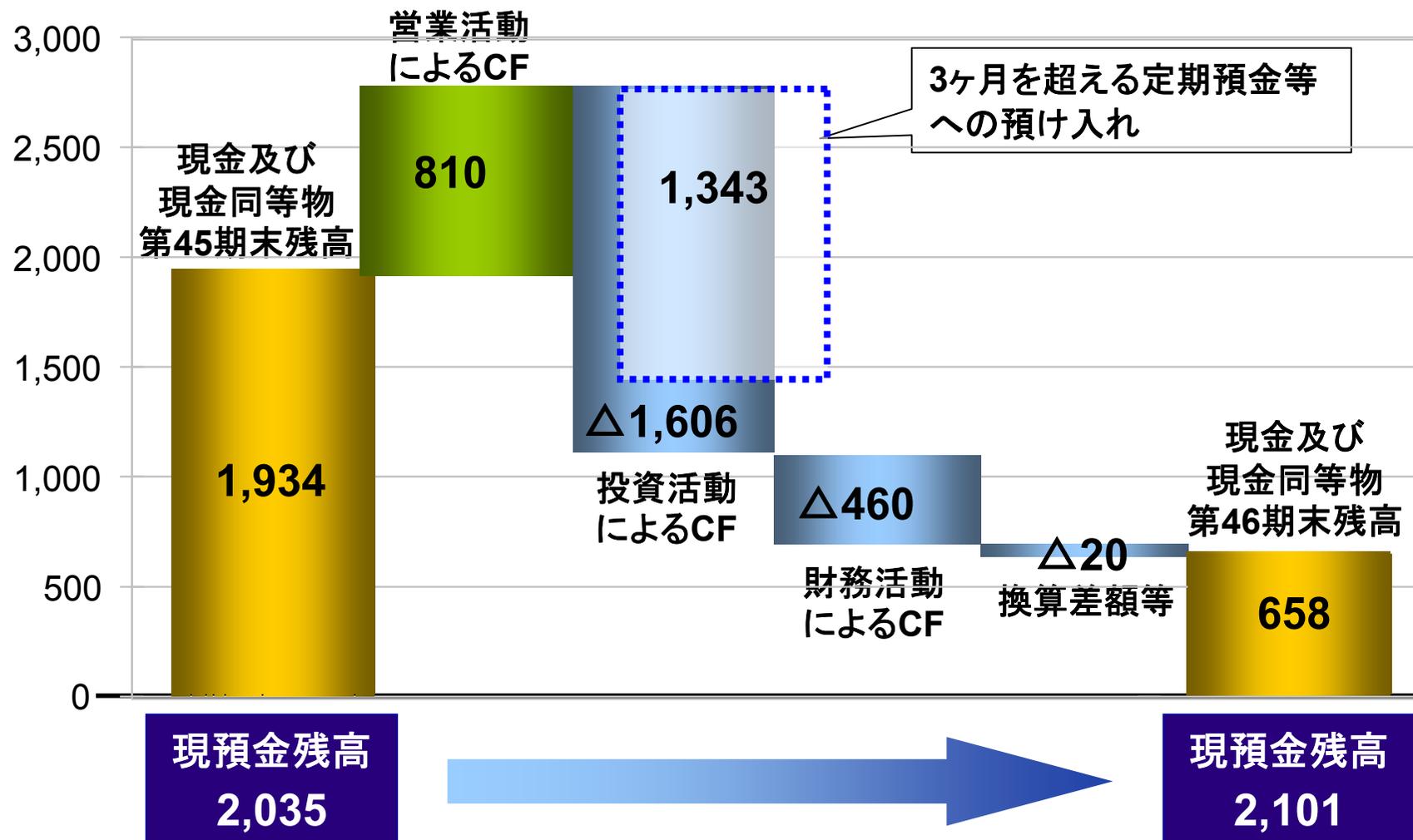
連結株主資本等変動計算書

(単位:億円)



連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:億円)



現預金残高:現金及び現金同等物に預入期間3ヶ月超の定期預金及び譲渡性預金を加えたもの



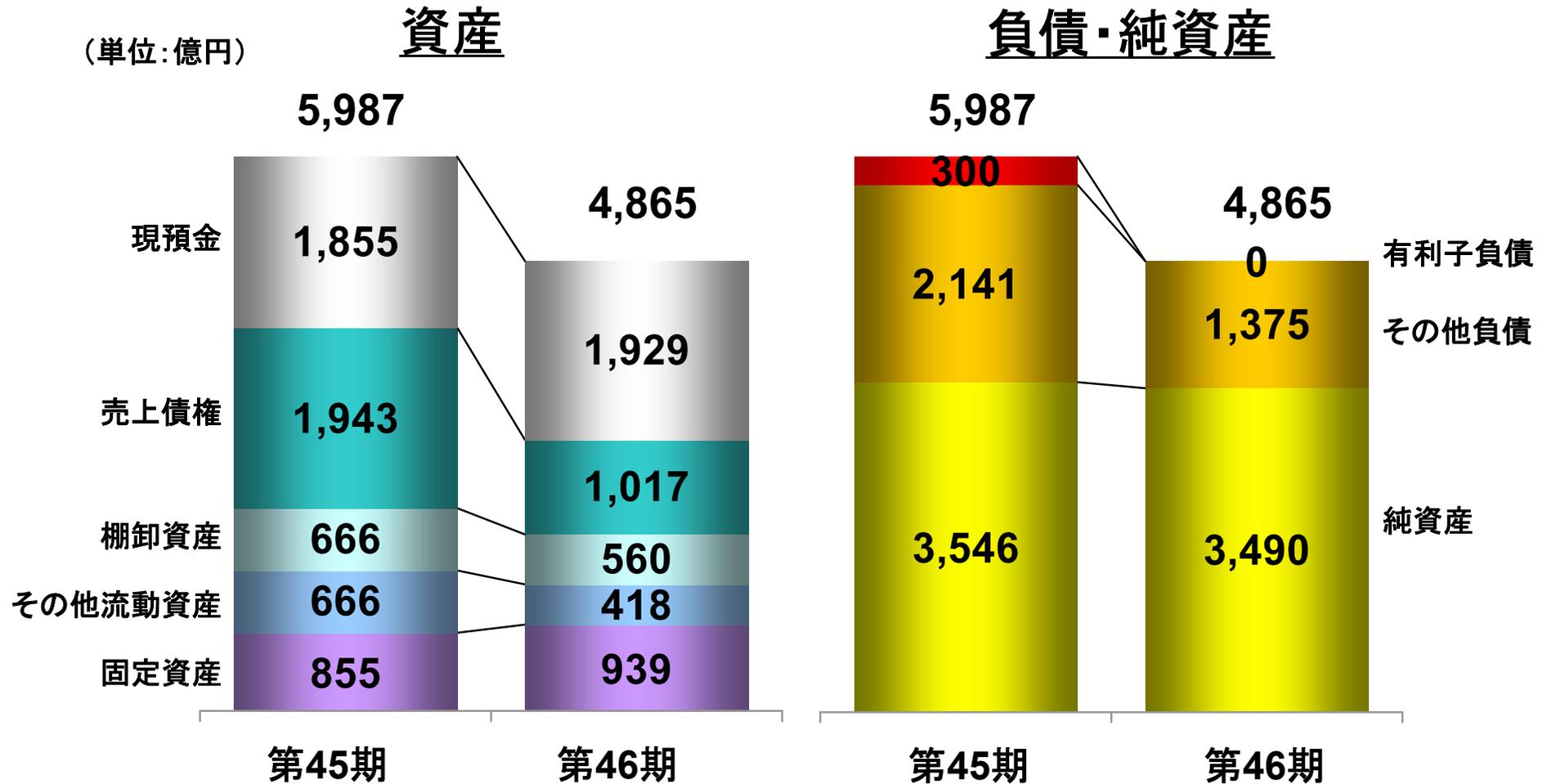
単独損益計算書

(単位:億円)

	単 独				
	第45期	(%)	第46期	(%)	増減率
売上高	7,675	100.0	3,894	100.0	△49.3%
営業利益	862	11.2	84	2.2	△90.3%
経常利益	959	12.5	149	3.8	△84.4%
税前利益	857	11.2	62	1.6	△92.7%
当期純利益	514	6.7	99	2.5	△80.7%

単独貸借対照表

(単位:億円)

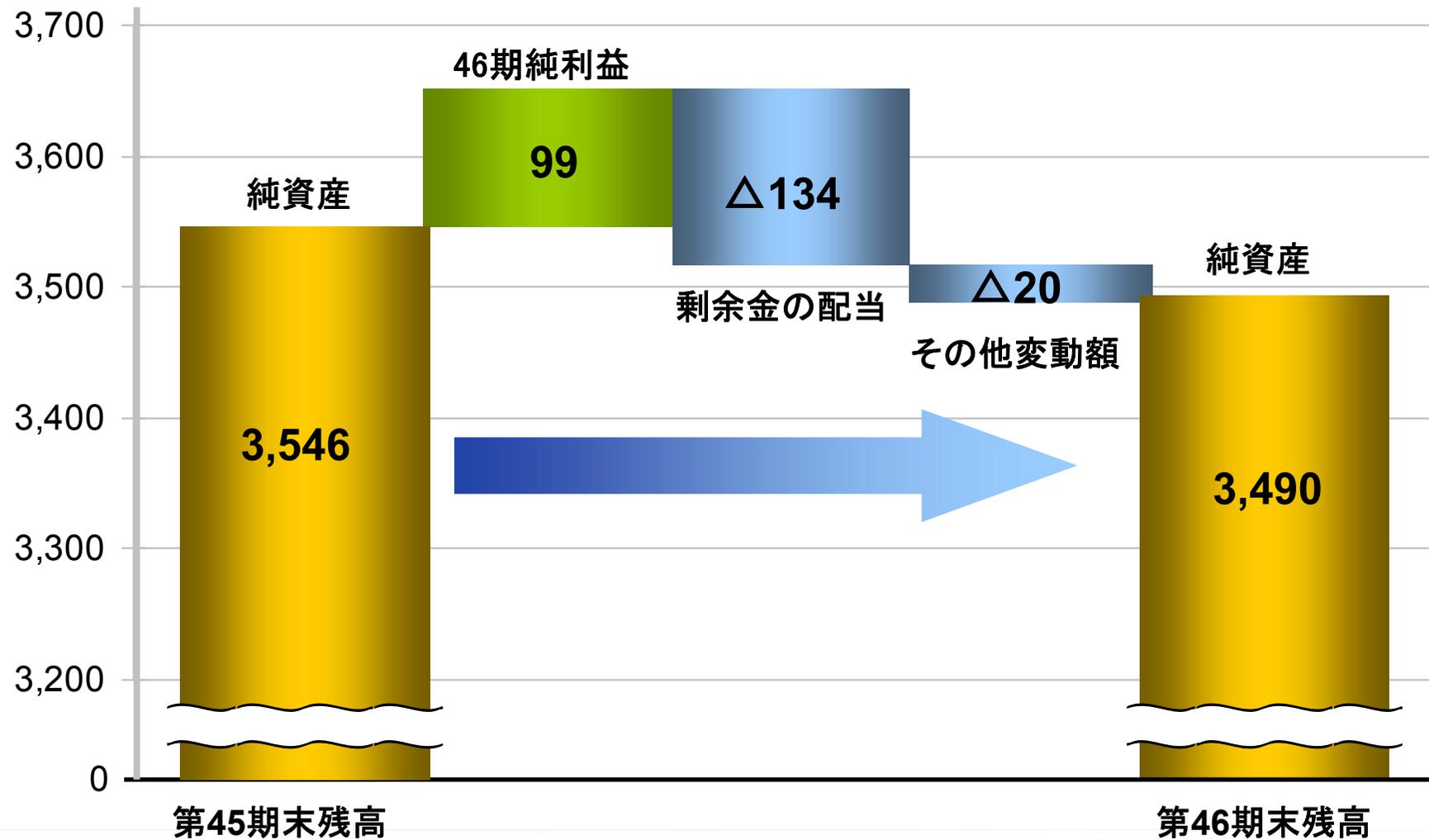


現預金: 現金及び預金と有価証券に含まれる譲渡性預金を加えたもの



単独株主資本等変動計算書

(単位:億円)



第46期 事業成果

継続的な研究開発投資と新製品創出

研究開発費609億円

SPE新モデルおよび第10世代FPD製造装置を市場投入
量産向けダブル・パターニング技術の確立

省エネルギーに対する取り組み

当社半導体製造装置の省エネルギー対応状況

国際的半導体業界団体より当社の製品全体を対象とした省エネルギー賞受賞

太陽電池製造装置事業における進展

シャープ(株)との共同開発

エリコン・ソーラー社との戦略的提携



第46期 事業成果

継続的な研究開発投資と新製品創出

研究開発費609億円

SPE新モデルおよび第10世代FPD製造装置を市場投入
量産向けダブル・パターニング技術の確立

省エネルギーに対する取り組み

当社半導体製造装置の省エネルギー対応状況

国際的半導体業界団体より当社の製品全体を対象とした省エネルギー賞受賞

太陽電池製造装置事業における進展

シャープ(株)との共同開発

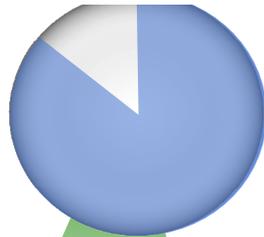
エリコン・ソーラー社との戦略的提携



製品市場シェア

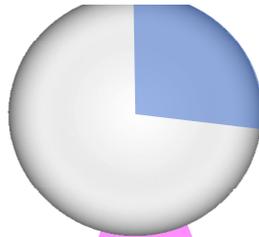
半導体製造装置市場シェア

コータ/
デベロッパ



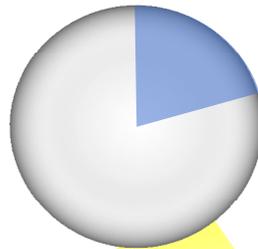
NO.1

プラズマ
エッチング



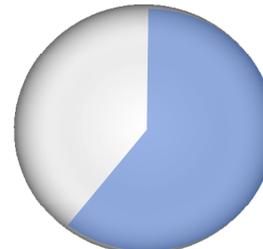
NO.2

洗浄



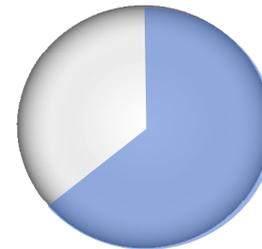
NO.2

メタルCVD



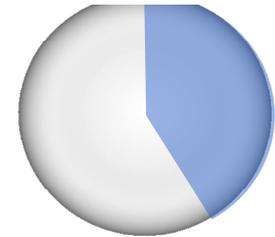
NO.1

熱処理成膜



NO.1

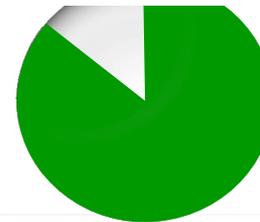
ウェーハ
プローバ



NO.2

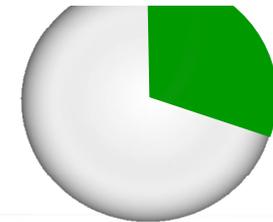
フラットパネルディスプレイ 製造装置市場シェア

プラズマ
エッチング



NO.1

コータ/
デベロッパ



NO.2

代表的な新製品



出所: 当社推定



次世代新微細化 プロセス・ソリューションの提供



第46期 事業成果

継続的な研究開発投資と新製品創出

研究開発費609億円

SPE新モデルおよび第10世代FPD製造装置を市場投入
量産向けダブル・パターニング技術の確立

省エネルギーに対する取り組み

当社半導体製造装置の省エネルギー対応状況

国際的半導体業界団体より当社の製品全体を対象とした省エネルギー賞受賞

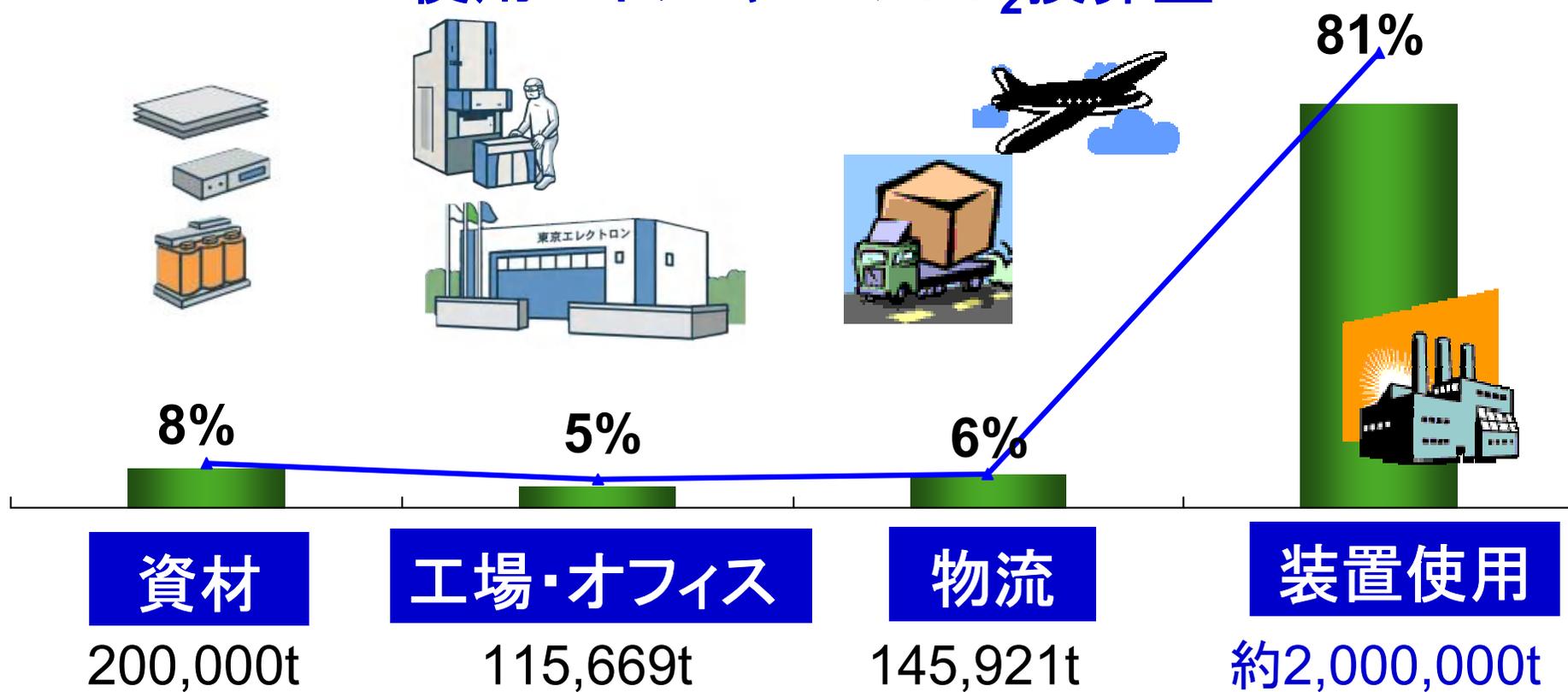
太陽電池製造装置事業における進展

シャープ(株)との共同開発

エリコン・ソーラー社との戦略的提携



当社環境負荷の全体像 使用エネルギーのCO₂換算量



出所: 当社調査(2007年度)

製品ライフサイクル全体で見ると装置使用時に80%



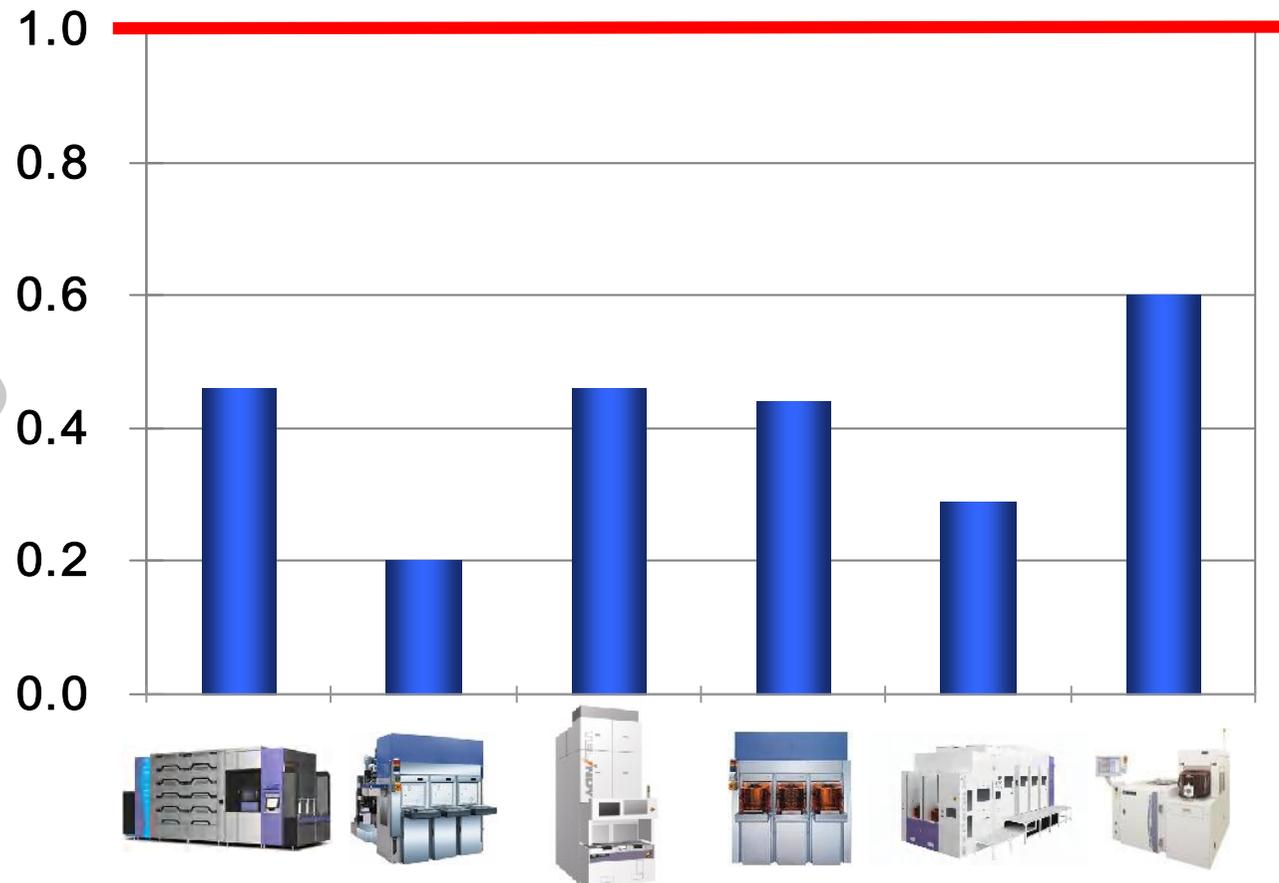
当社半導体製造装置の省エネルギー状況

'99年の基準値に対する'08年の総使用エネルギー削減の実績値

基準値



省エネルギー方向

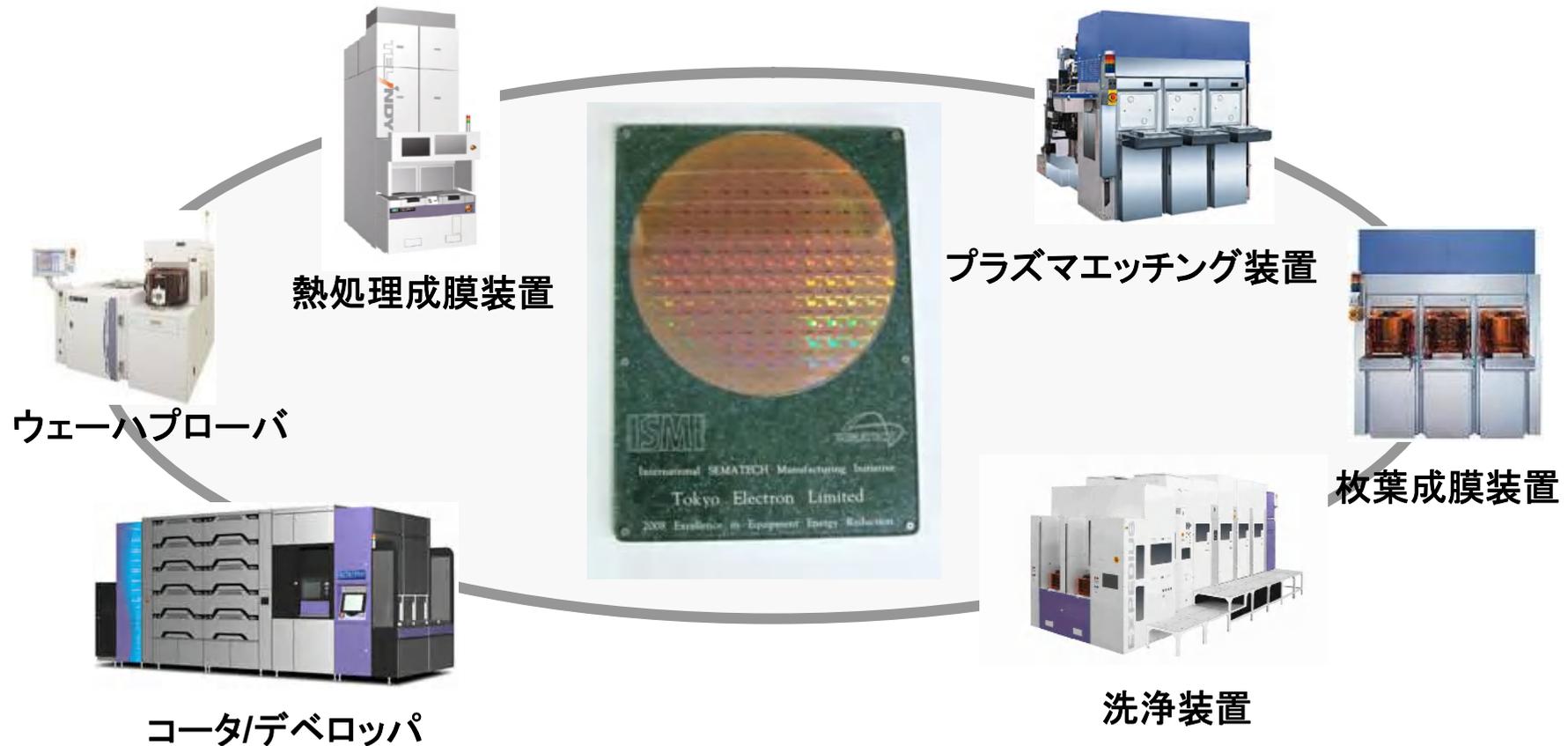


使用総エネルギー量を電力等価換算し、基準値を1として相対比較 (KW/cm²)



2008年 装置省エネルギー優秀賞

国際的業界団体 (ISMI) より当社製品群に対して受賞



ISMI: International SEMATECH Manufacturing Initiative

第46期 事業成果

継続的な研究開発投資と新製品創出

研究開発費609億円

SPE新モデルおよび第10世代FPD製造装置を市場投入
量産向けダブル・パターニング技術の確立

省エネルギーに対する取り組み

当社半導体製造装置の省エネルギー対応状況

国際的半導体業界団体より当社の製品全体を対象とした省エネルギー賞受賞

太陽電池製造装置事業における進展

シャープ(株)との共同開発

エリコン・ソーラー社との戦略的提携



シャープ(株)との装置共同開発

共同開発完了、出荷体制へ

SHARP



東京エレクトロン

太陽光パネルの
リーディングカンパニー

製造装置量産技術
開発力

エリコン・ソーラー社との代理店契約締結

市場急成長が期待されるアジア・オセアニアでの
ビジネス拡大

erlikon
solar



東京エレクトロン

薄膜系太陽電池
一貫製造ライン最大手

市場開拓力
販売・技術サポート



第46期配当

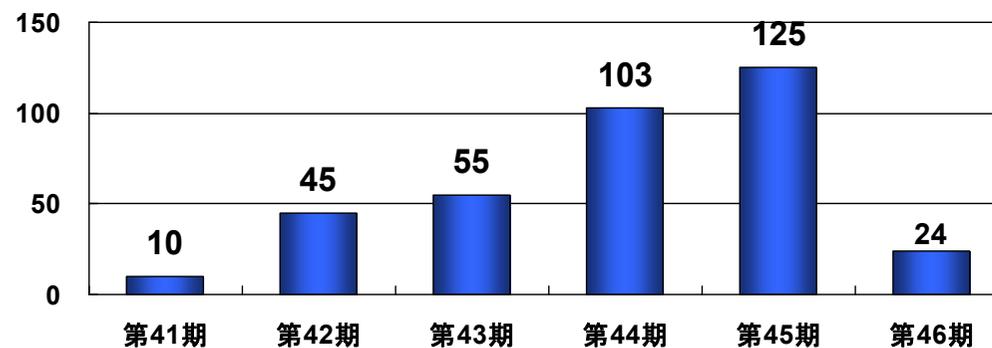


第46期の配当

1株当たり配当金

	中間	期末	年間	配当総額	連結 配当性向
第45期	70 円	55 円	125 円	223 億円	21.0 %
第46期	20 円	4 円	24 円	42 億円	56.9 %

(円) 過去5年間の配当金推移



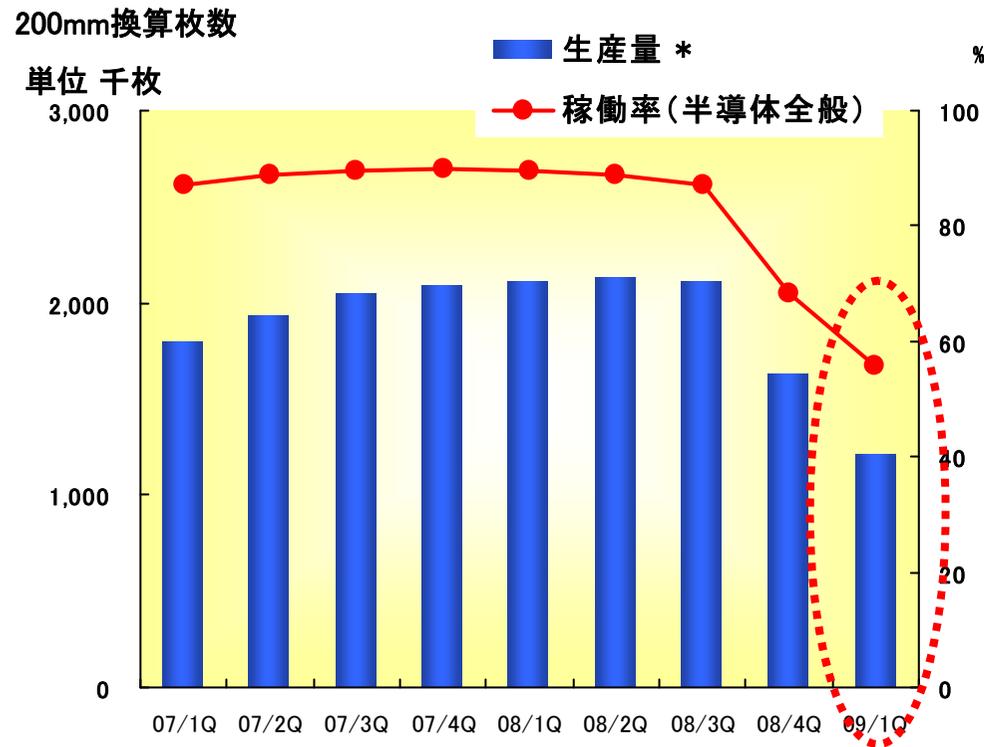
第47期業績見通し



半導体業界の状況

半導体工場の稼働率

出所: SICAS



* 週あたりウェーハ投入枚数

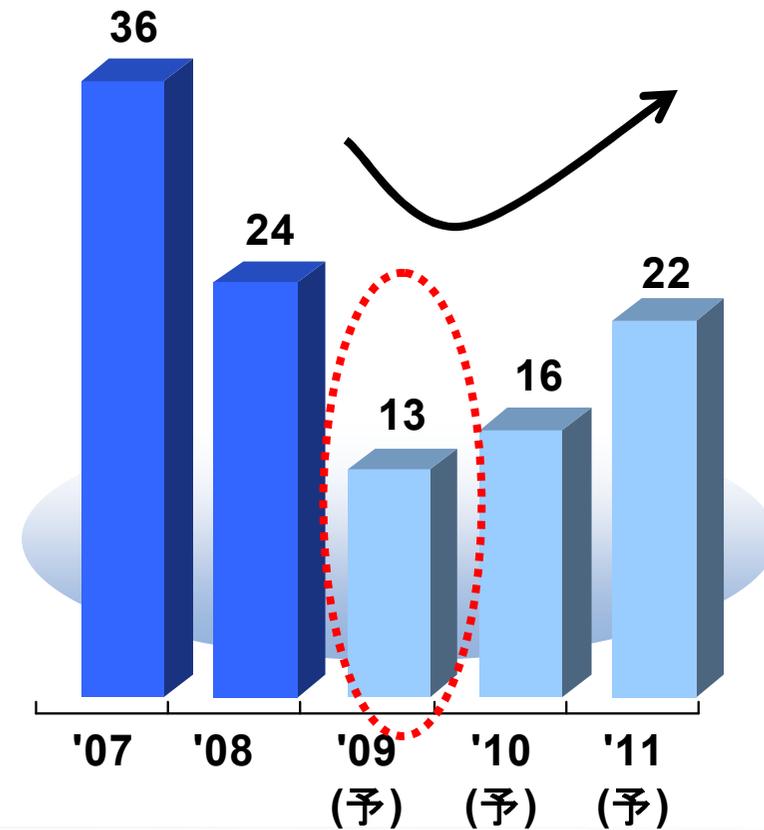
SICAS: Semiconductor International Capacity Statistics



半導体前工程装置市場

出所: Gartner (June 2009)

10億米ドル



現在の事業環境

■ 半導体製造装置(SPE)

- 厳しい受注環境続く
- 新技術向けの投資案件あり

■ フラットパネルディスプレイ製造装置(FPD)

- 全体的な回復力は鈍い
- 中国向けTV需要あり

■ 太陽電池製造装置(PVE)

- 世界経済悪化と政府援助の縮小により市場減速
- 将来的には大きな成長を期待

下期以降の市況回復に期待

第47期 業績見通し

(単位:億円)

	第46期	第47期(予想)			
	通期	上期	下期	通期	対前年 増減率
売上高	5,080	1,260	1,740	3,000	-41%
SPE	3,253	600	1,040	1,640	-50%
FPD/PVE	881	295	295	590	-33%
EC/CN	942	365	405	770	-18%
その他	3	0	0	0	-
営業利益	147 (2.9)	-420 (-33.3)	-210 (-12.1)	-630 (-21.0)	-
経常利益	205 (4.0)	-410 (-32.5)	-200 (-11.5)	-610 (-20.3)	-
税前利益	96 (1.9)	-410 (-32.5)	-200 (-11.5)	-610 (-20.3)	-
当期純利益	75 (1.5)	-260 (-20.6)	-120 (-6.9)	-380 (-12.7)	-
1株当り配当金 (円)	24	4	4	8	

1. SPE: 半導体製造装置, FPD/PVE: フラットパネルディスプレイ及び太陽電池製造装置, EC/CN: 電子部品・情報通信機器
 2. (): 利益率



第47期の重点施策

1. 次の成長に向けて総点検

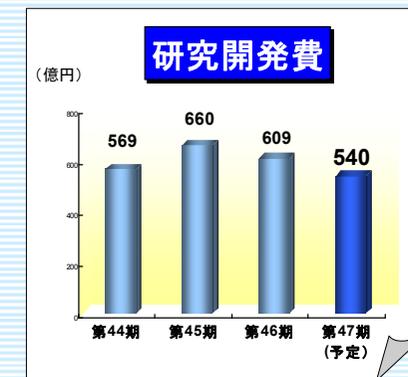
- 総額300億円の固定費削減（2年累計700億円）
- 既存事業を徹底的に強化

2. 成長のための人材・研究開発投資を継続

- 高い成長が見込める分野への選択的積極投資

3. 市場変化への重点対応

- ポストセールス事業の拡大
- 太陽電池事業の強化



中期的視野を持ちながら、短期的な諸問題に対応

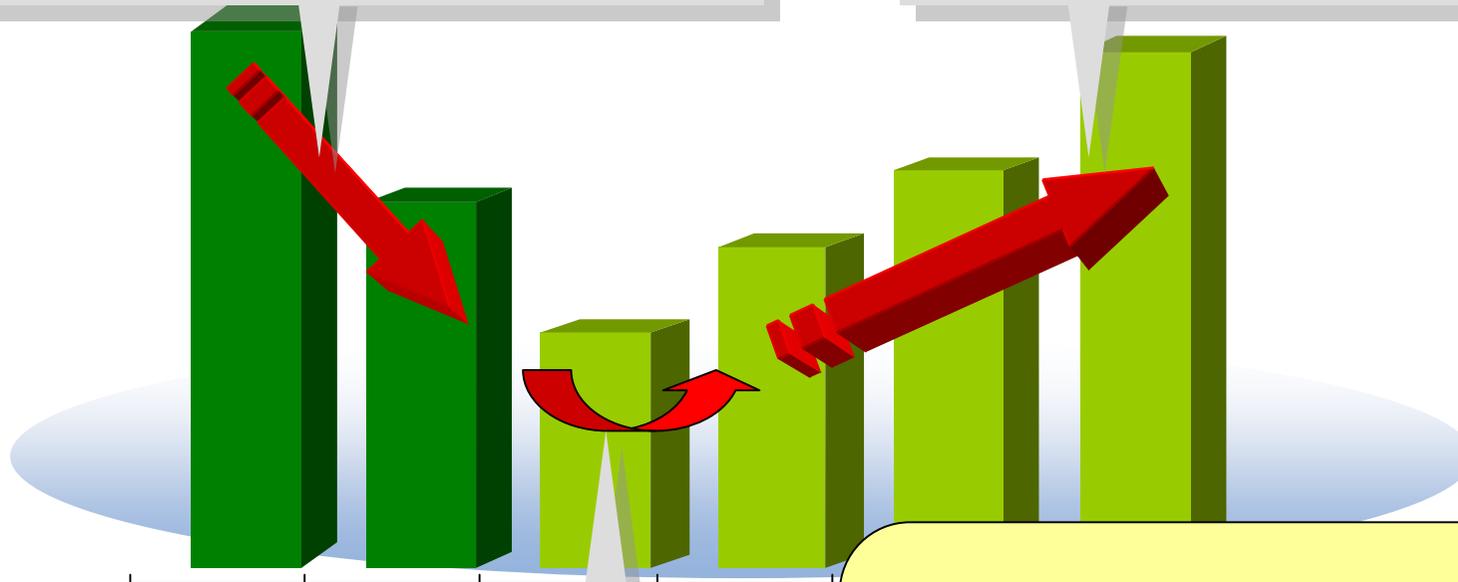
事業環境の変化



世界の経済動向

金融バブルの崩壊による
世界的経済不況

新興国を含めた
多極的経済発展の加速

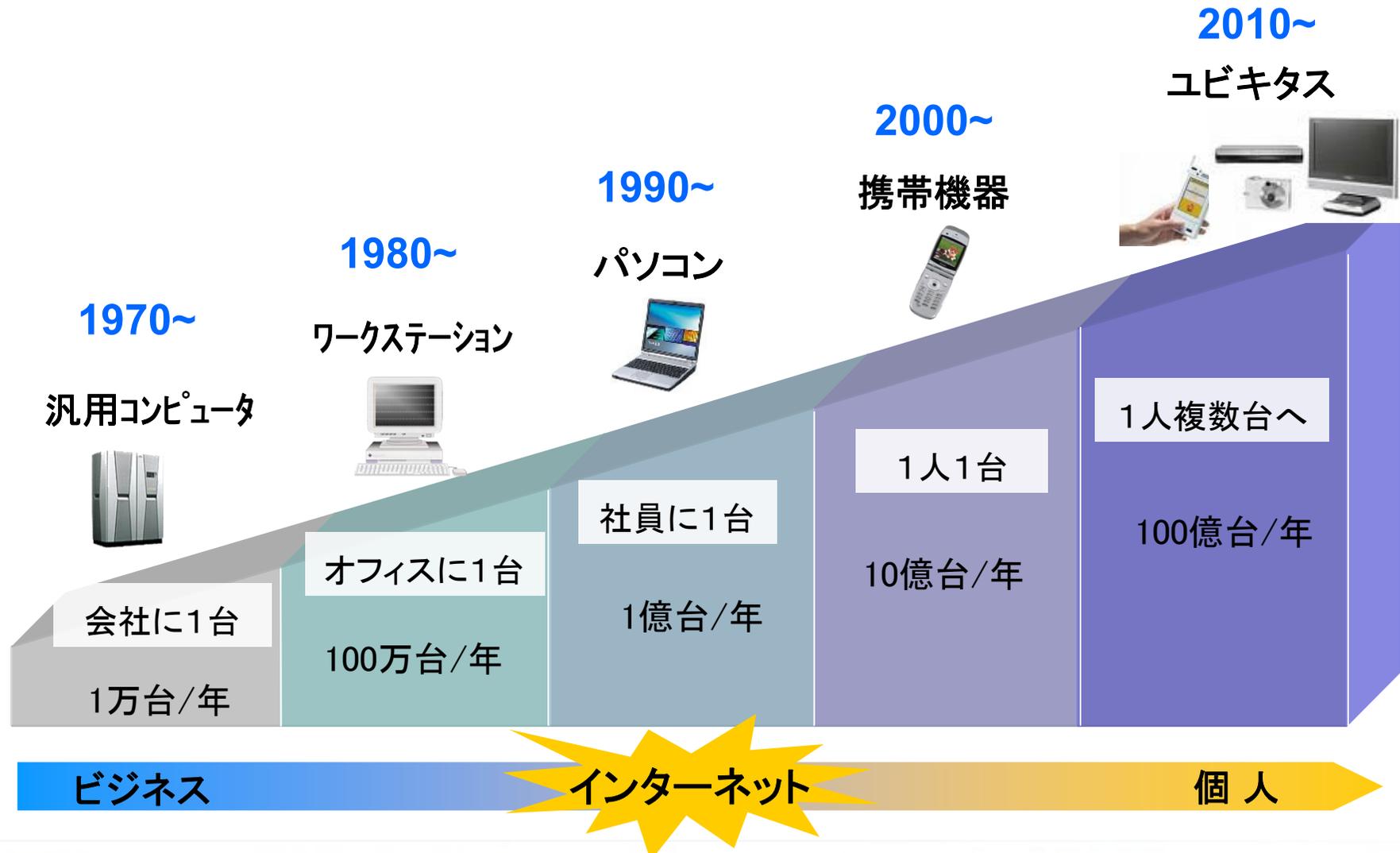


实体经济の
健全な回復に向けた
国家的取り組み

経済発展のキーワード

1. グローバル・ネットワーク社会
2. 新たな購買層
3. 持続可能な社会

半導体主要用途の広がり

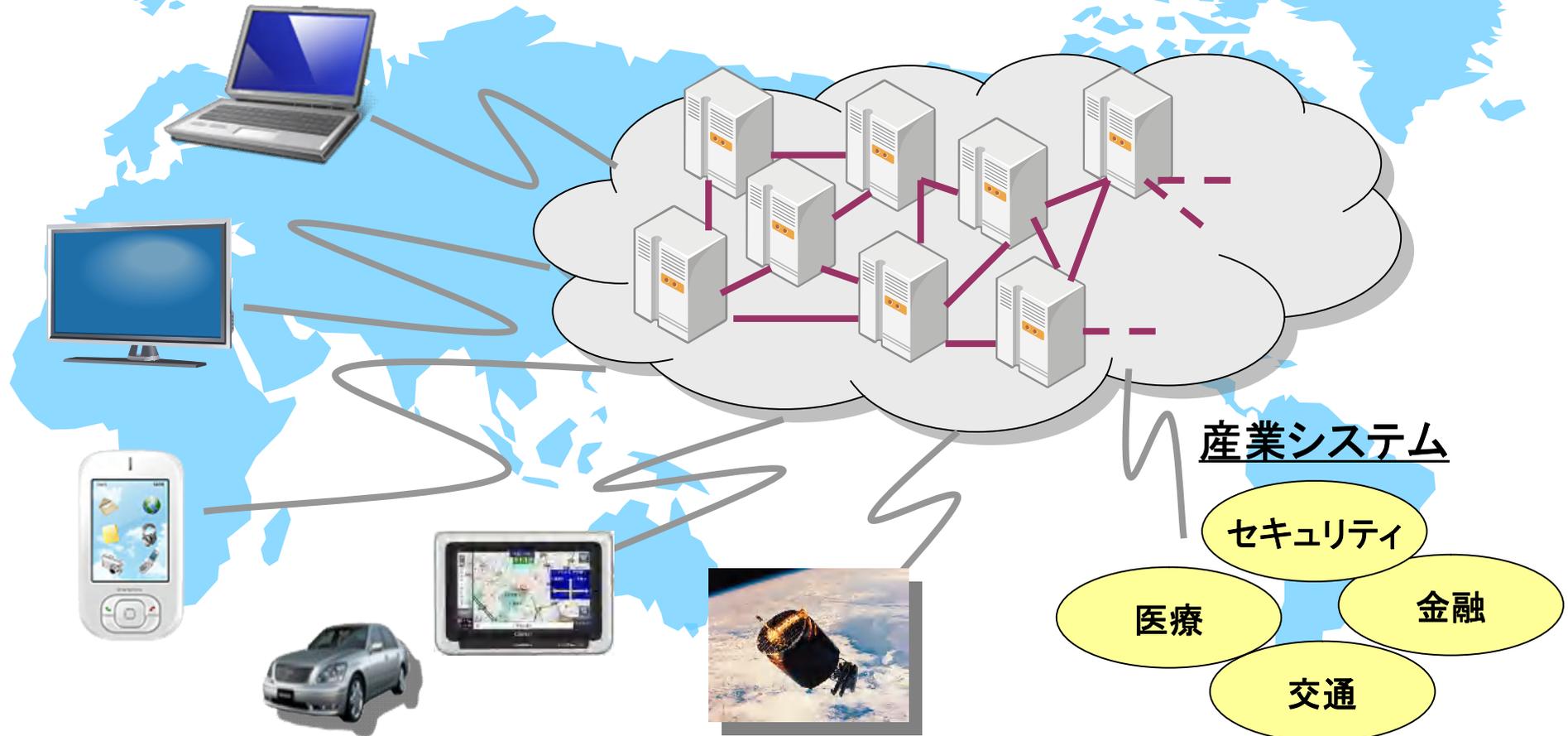


* ユビキタス: インターネットなどの情報ネットワークに「いつでもどこからでも」アクセスできる環境



世界的な経済発展を生み出す グローバル・ネットワーク社会の拡大

あらゆる電子機器、産業システムがネットワークに繋がる社会

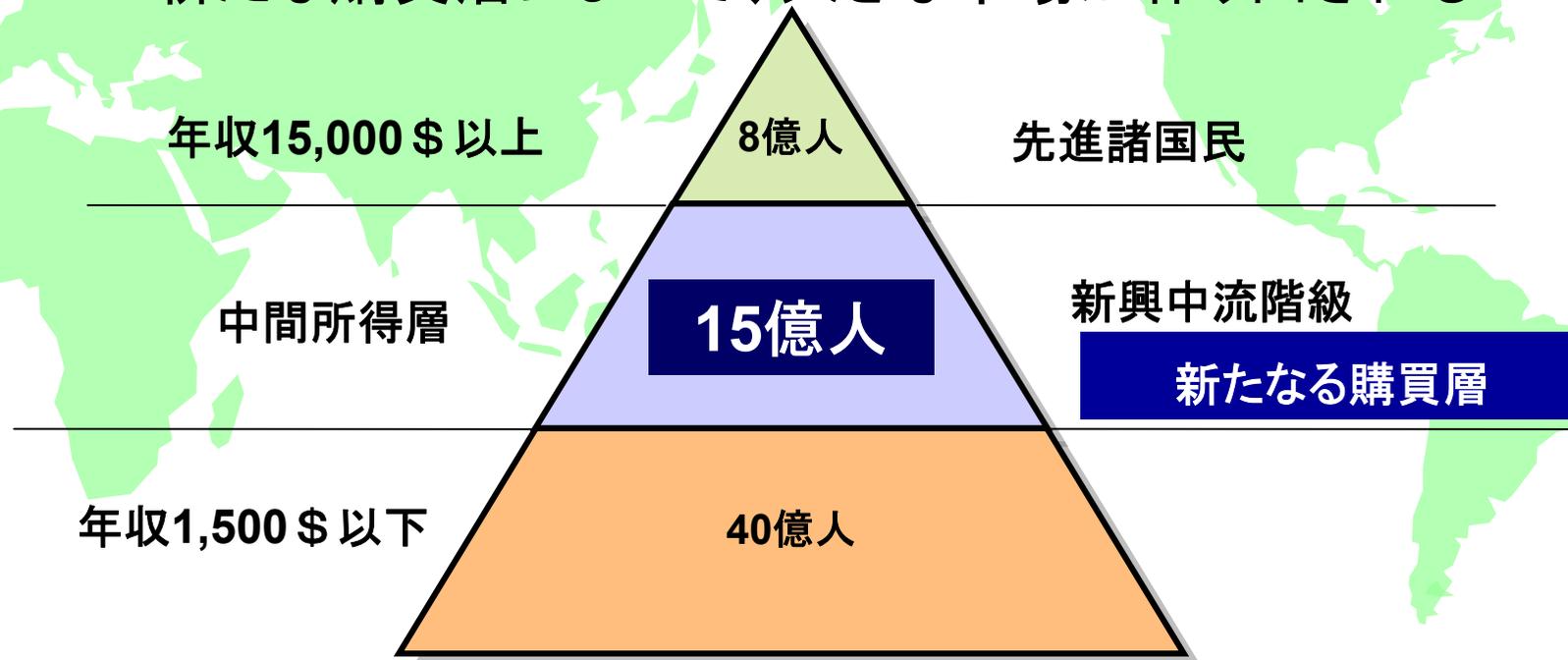


ネットワーク社会を支える高度なインフラの拡大



新たな購買層の出現による 市場規模の拡大

情報、金融、交通網の世界的拡がりが生み出す
新興国を中心とした15億人規模の
新たな購買層によって、大きな市場が作り出される



出典：『未来をつくる資本主義』 スチュアート・L・ハート著
参考文献：The Fortune at the Bottom of the Pyramid 2002 より



大量消費社会から持続可能な社会への転換

低消費電力化技術
半導体・FPD

クリーンエネルギー技術
太陽光発電

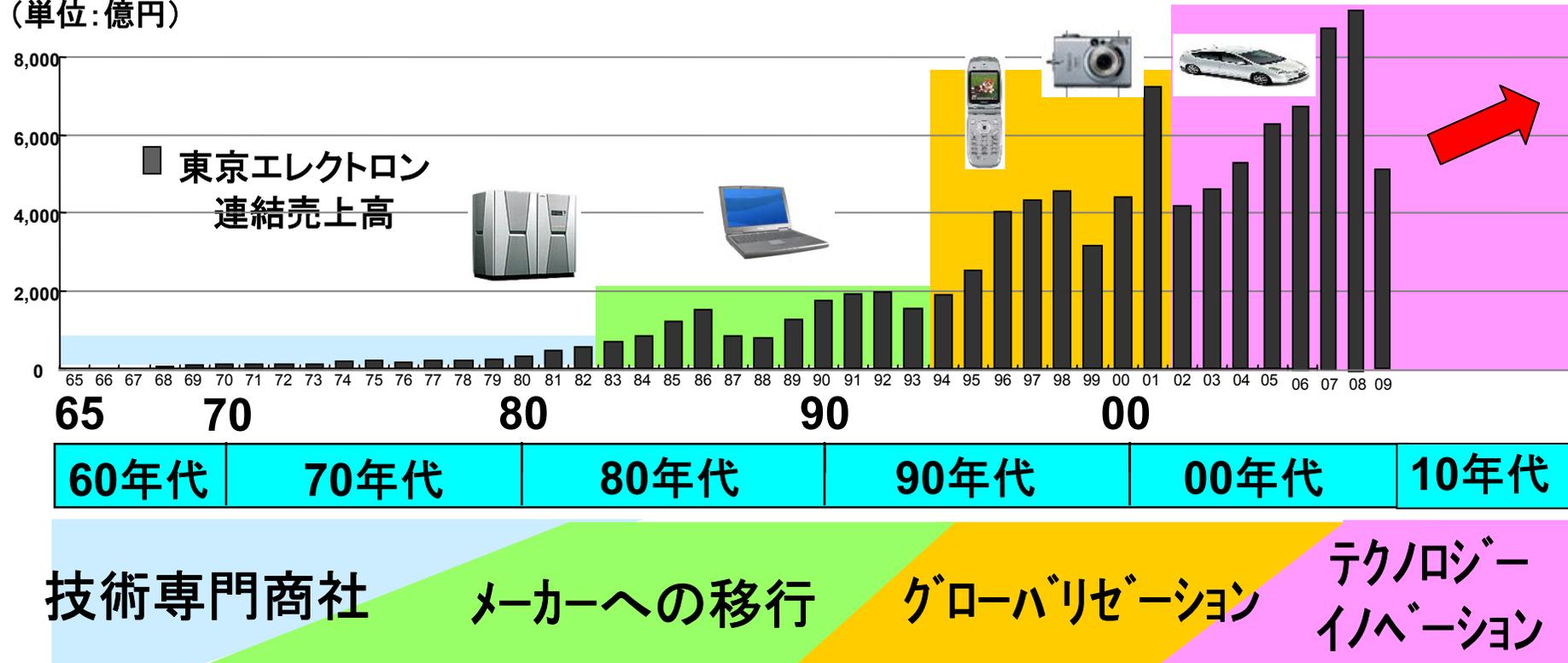


Technology 
for Eco Life



新たな技術革新の実現に向けて

(単位:億円)



グローバル化の次の段階への移行
多極化する市場を**技術革新**により自らが創造



中期ビジョン

- 技術革新を創造するイノベーション・カンパニー
- 国際競争力を持つグローバル・リーダー
- 顧客要求に対応、ベスト・ソリューションを提供
- 環境問題への対策にグローバルで貢献



**私たちの技術が
世界を支え、未来を創ります。**



中期事業戦略

代表取締役社長 竹中 博司



中期事業戦略

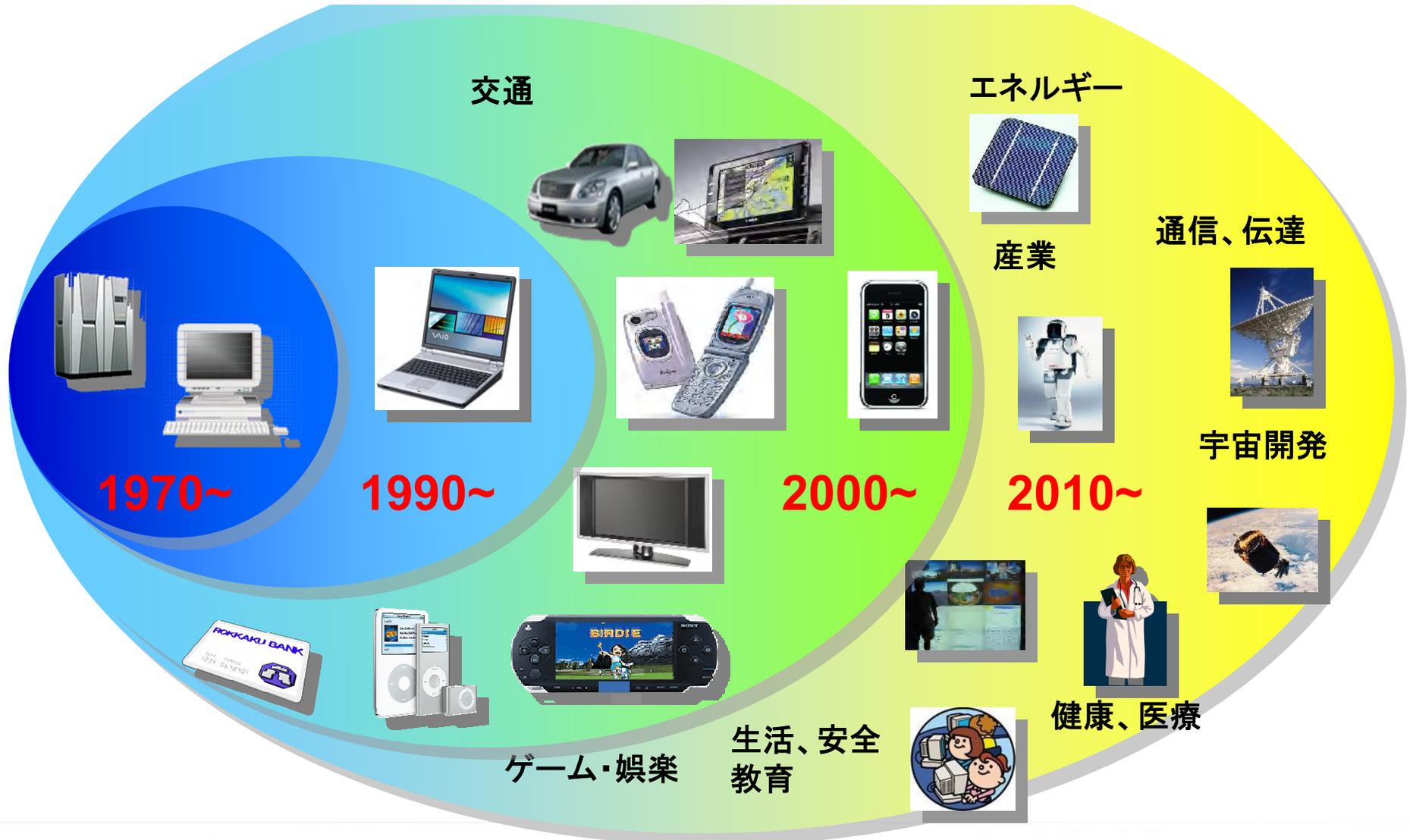
- 半導体製造装置事業 (SPE)
- フラットパネルディスプレイ製造装置事業 (FPD)
- 太陽電池製造装置事業 (PVE)



半導体製造装置事業(SPE)



アプリケーションの広がり



半導体搭載量の伸び

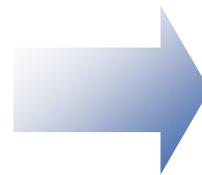
ミドルクラス・カー

搭載半導体個数
10-30 個



ハイブリッド・カー

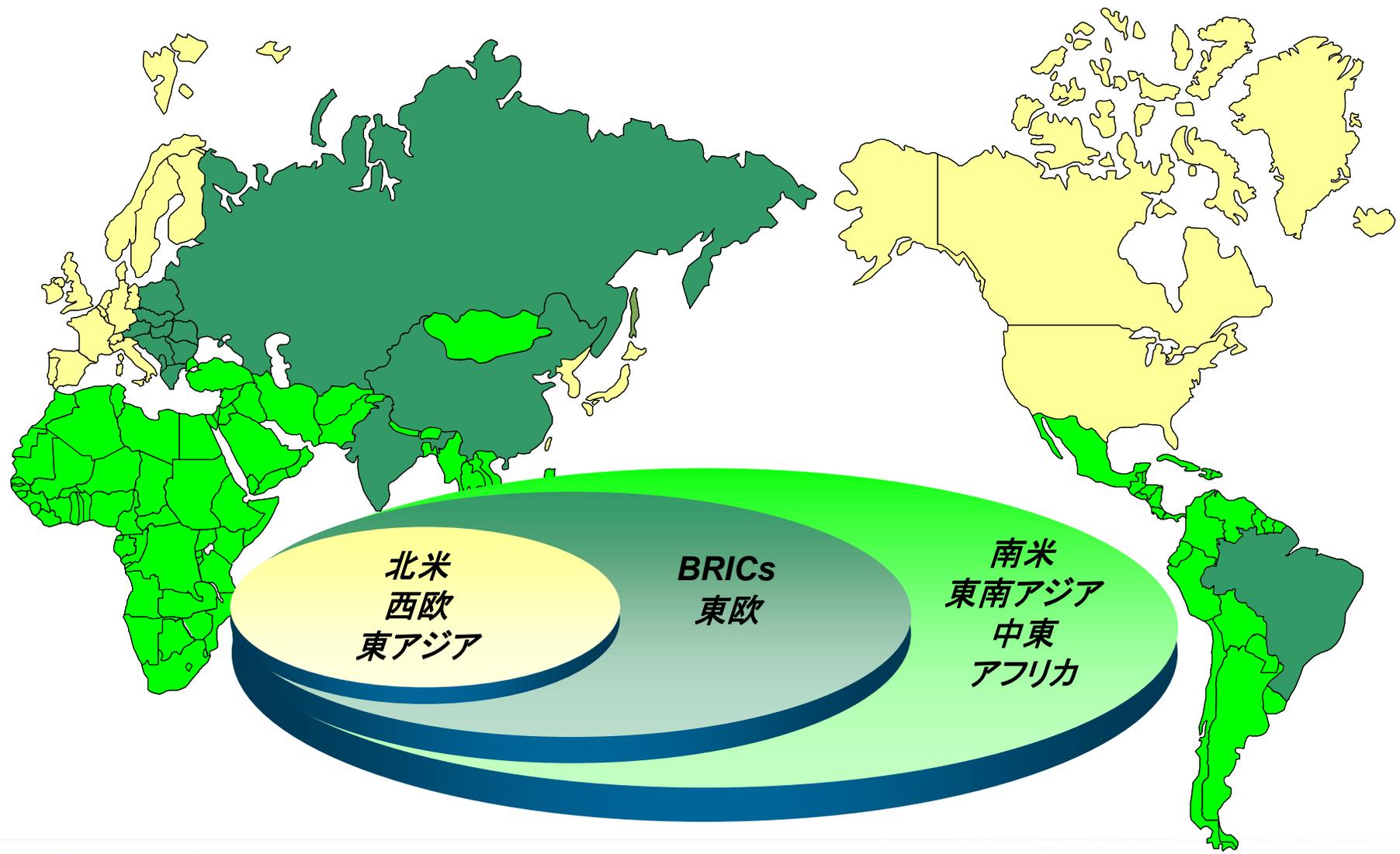
搭載半導体個数
100-200 個



ハイブリッド車両用制御部品
カーナビゲーションシステム
ETCシステム

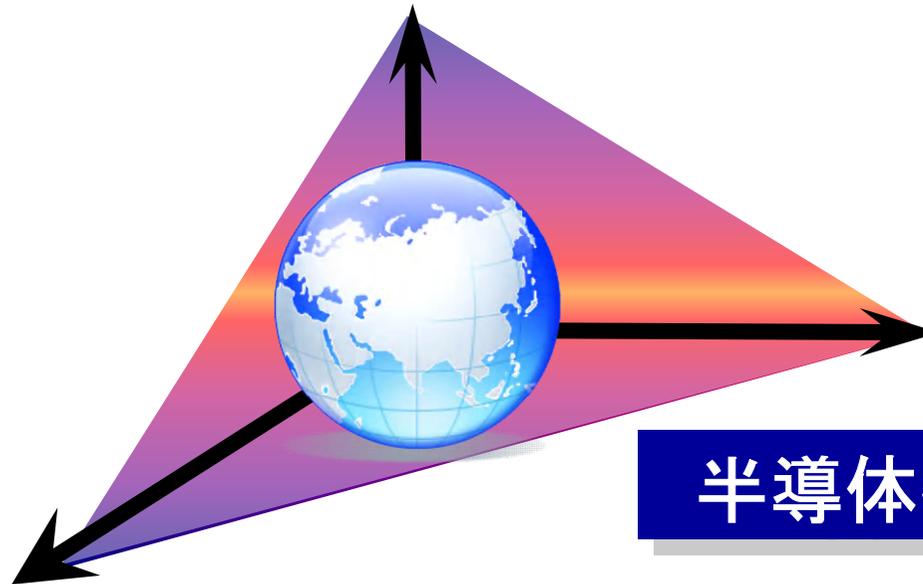
データ通信モジュール
オートエアコン制御
車間制御クルーズシステム…

地域的な広がり



半導体デバイス市場

アプリケーションの広がり



半導体搭載量の伸び

地域的な広がり



半導体製造装置(SPE)

- 変化する事業環境 -

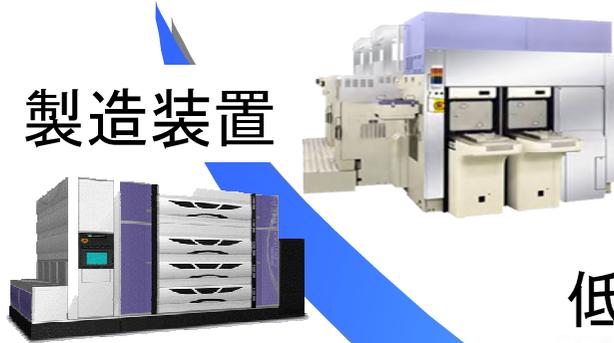
- プロセス技術： 微細化、低消費電力化
- 装置市場： アジアシフト、寡占化加速
- ポストセールス： 装置のロングライフ化

市場変化に即応し、事業拡大



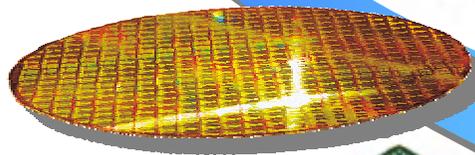
半導体の微細化と低消費電力化

製造装置



微細化と
低消費電力化

小型・高性能・低価格
省エネルギーの電子機器



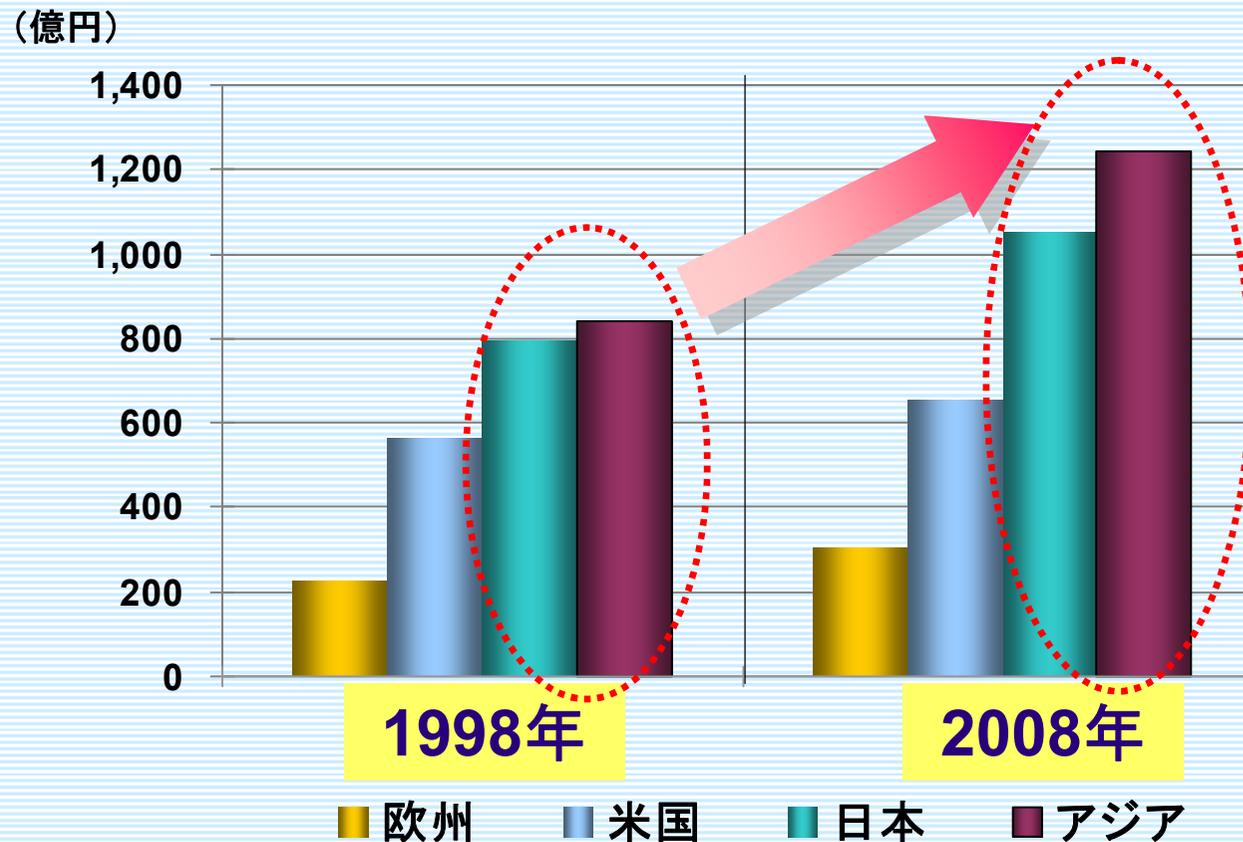
高度な安全・金融・交通
医療システム



より安全・安心・快適、そして環境に優しい社会の実現



当社地域別売上高の変遷

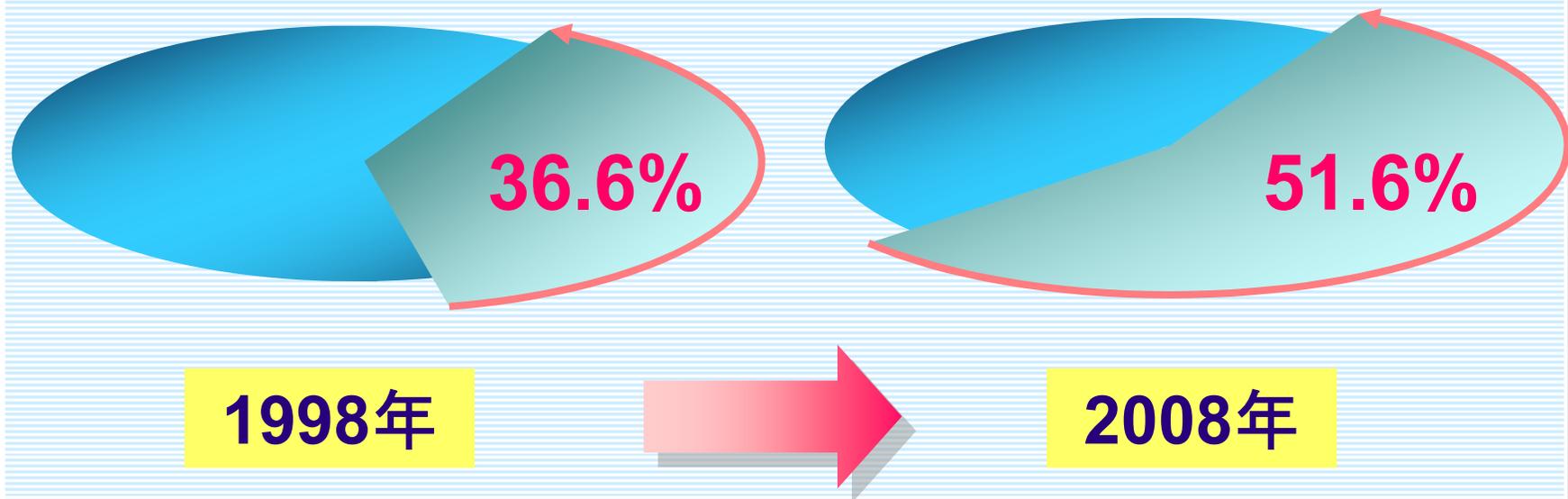


アジア半導体メーカーの台頭



顧客の寡占化

上位7社グループが占める設備投資額の割合



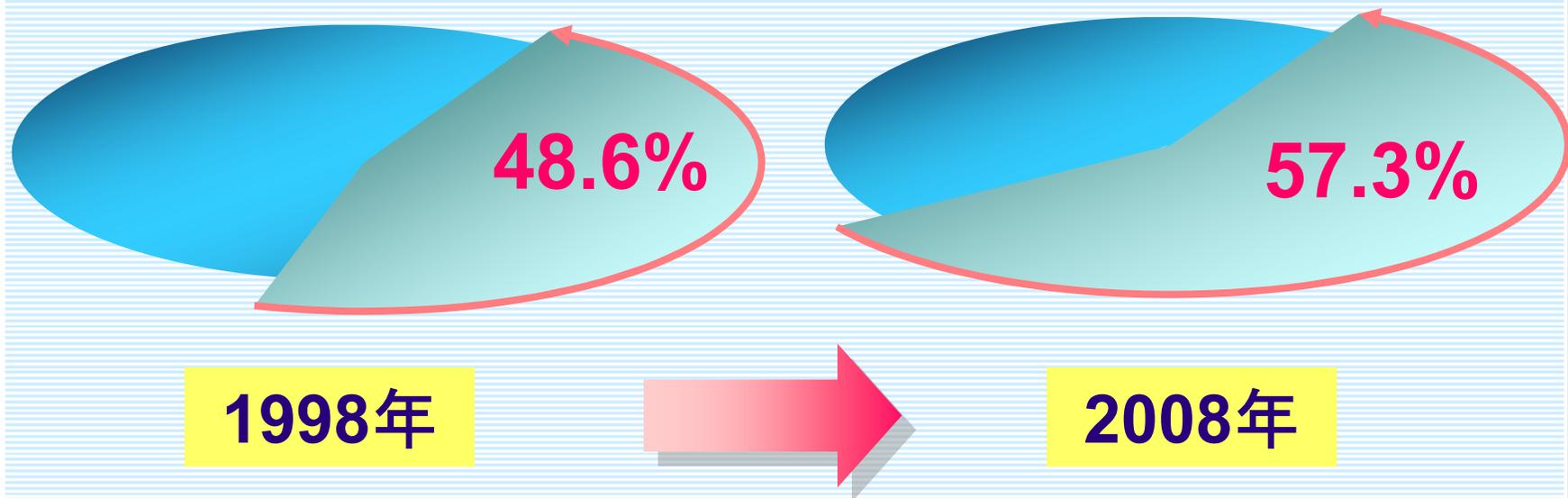
出所: Gartner を基に当社作成

上位顧客による寡占化



半導体製造装置メーカーのシェア推移

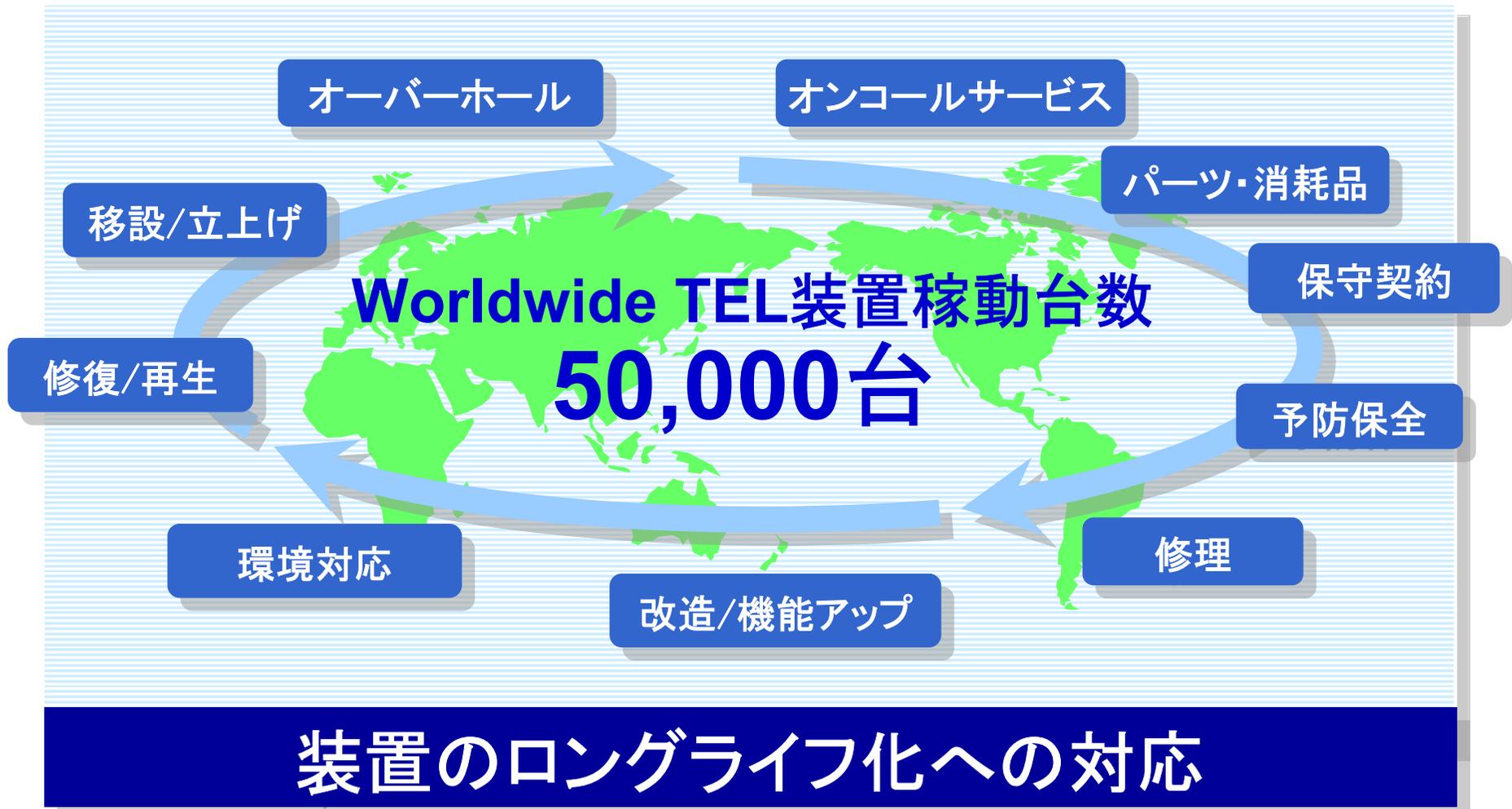
前工程装置市場に占める上位5社の割合



出所: Gartner を基に当社作成

上位装置メーカーによる寡占化

ポストセールス事業を強化



変化はTELのビジネスチャンス

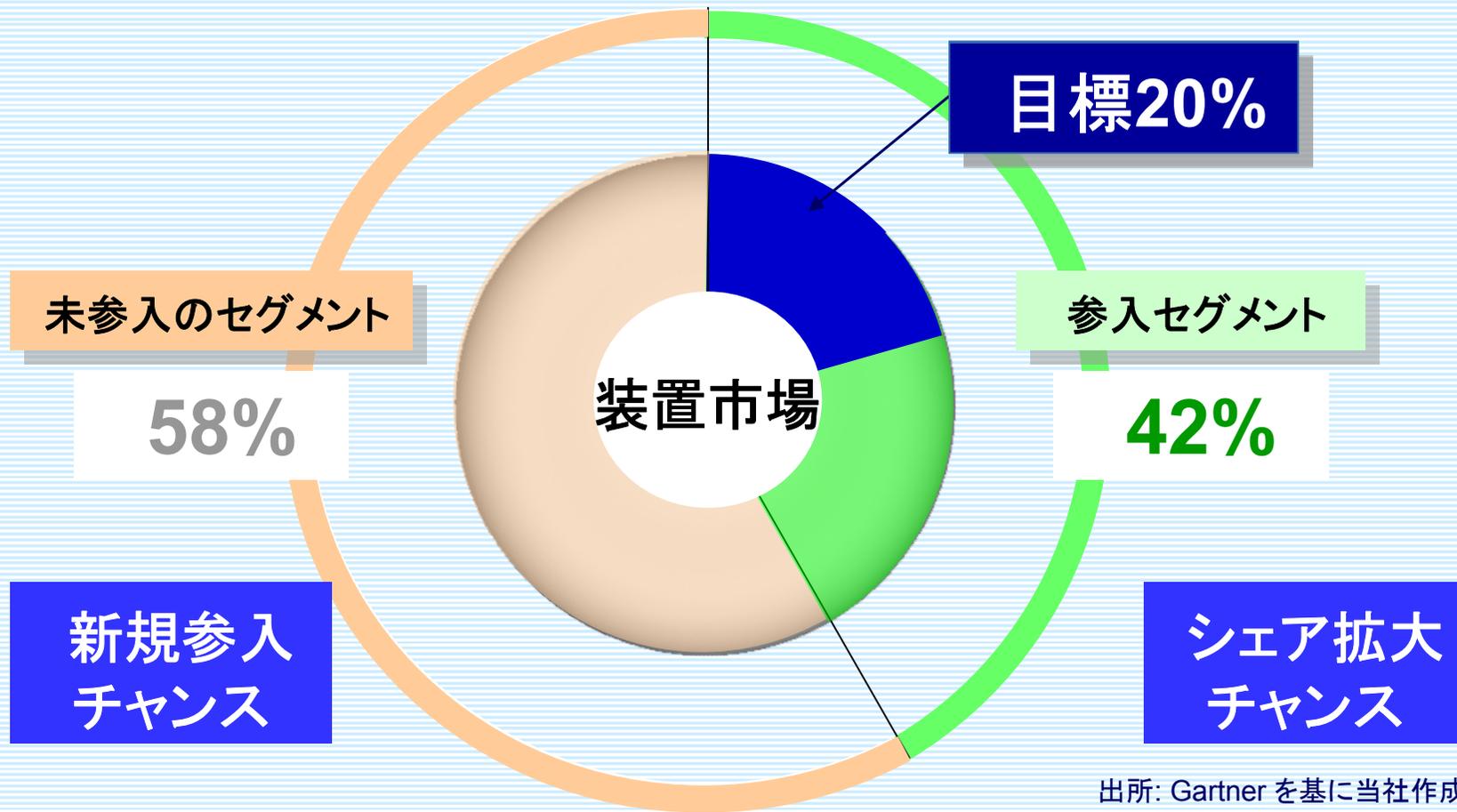
- ▶ **微細化、低消費電力化への対応**
 - ▶ トップシェアの製品ラインナップ
 - ▶ マルチプロダクトによる価値創造

- ▶ **顧客の寡占化**
 - ▶ 上位半導体メーカーとの連携強化
 - ▶ アジアにおける強固な販売サポート網

- ▶ **装置のロングライフ化**
 - ▶ 全世界約50,000台の稼働装置
 - ▶ 提案型ポストセールスによる付加価値提供

半導体前工程装置市場と当社シェア

市場規模: 2.5兆円 当社シェア: 13.5% (2008)



フラットパネルディスプレイ 製造装置事業 (FPD)



フラットパネルディスプレイ

ユビキタス時代における省スペース・低消費電力で
環境にやさしいディスプレイ

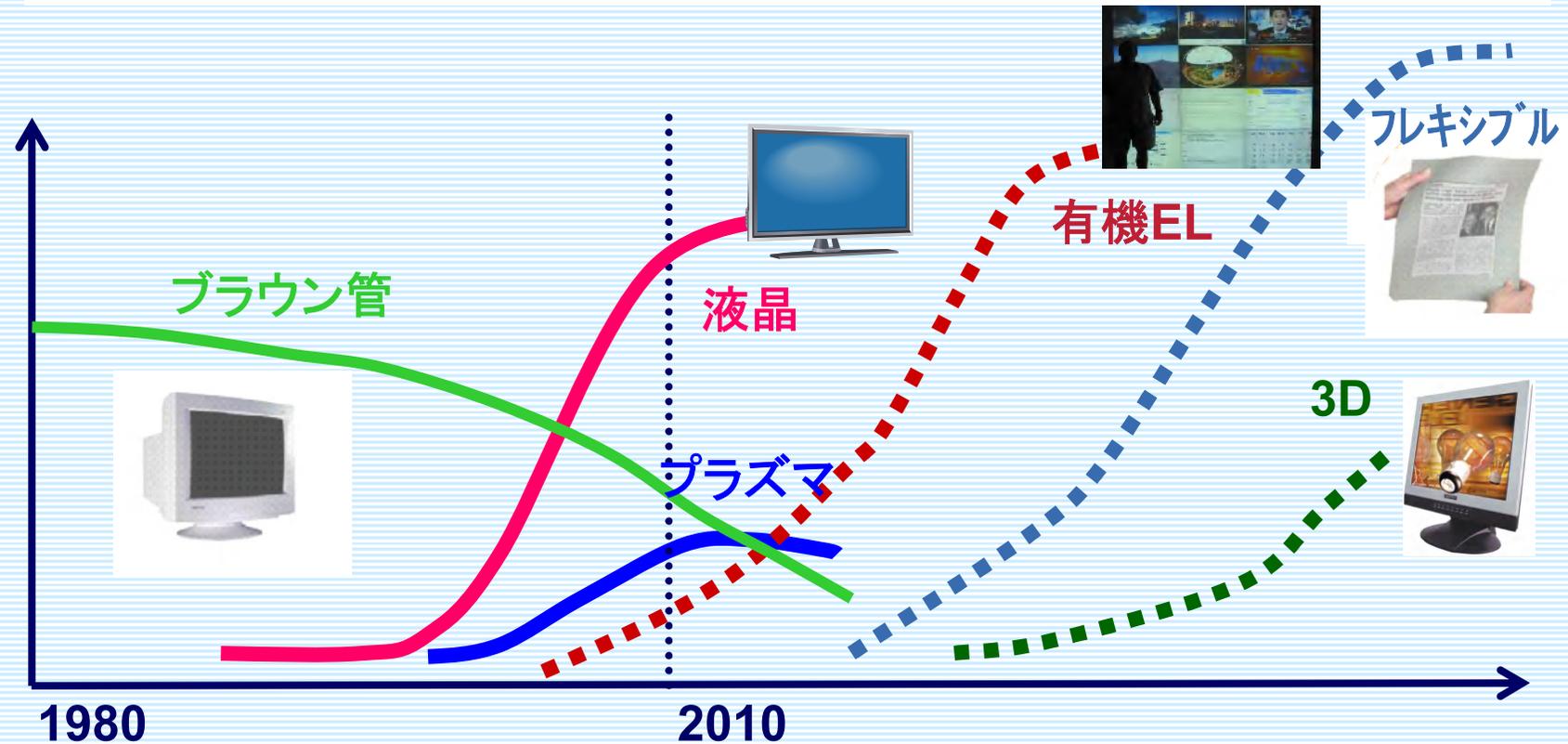


出所: 総務省 u-Japan 資料

2010年に表示機器世界市場の80%以上に拡大

ディスプレイ市場の動向

今後も情報伝達の窓として拡大
高性能化への尽きない技術革新



FPD 基本戦略

-  **参入市場でのシェア拡大を追求**
 - 製品シェア60%以上
 - 新興市場でのビジネス拡大

-  **ディスプレイの大型化に対応**
 - 大型TVの需要増に対応したプロダクト開発

-  **将来市場への参入**
 - 有機ELなど、有望技術の開発に継続投資

太陽電池製造装置事業(PVE)

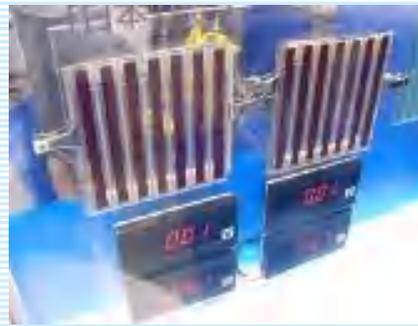


太陽光発電技術

地球環境問題は人類共通の課題



薄膜太陽電池



色素増感型太陽電池

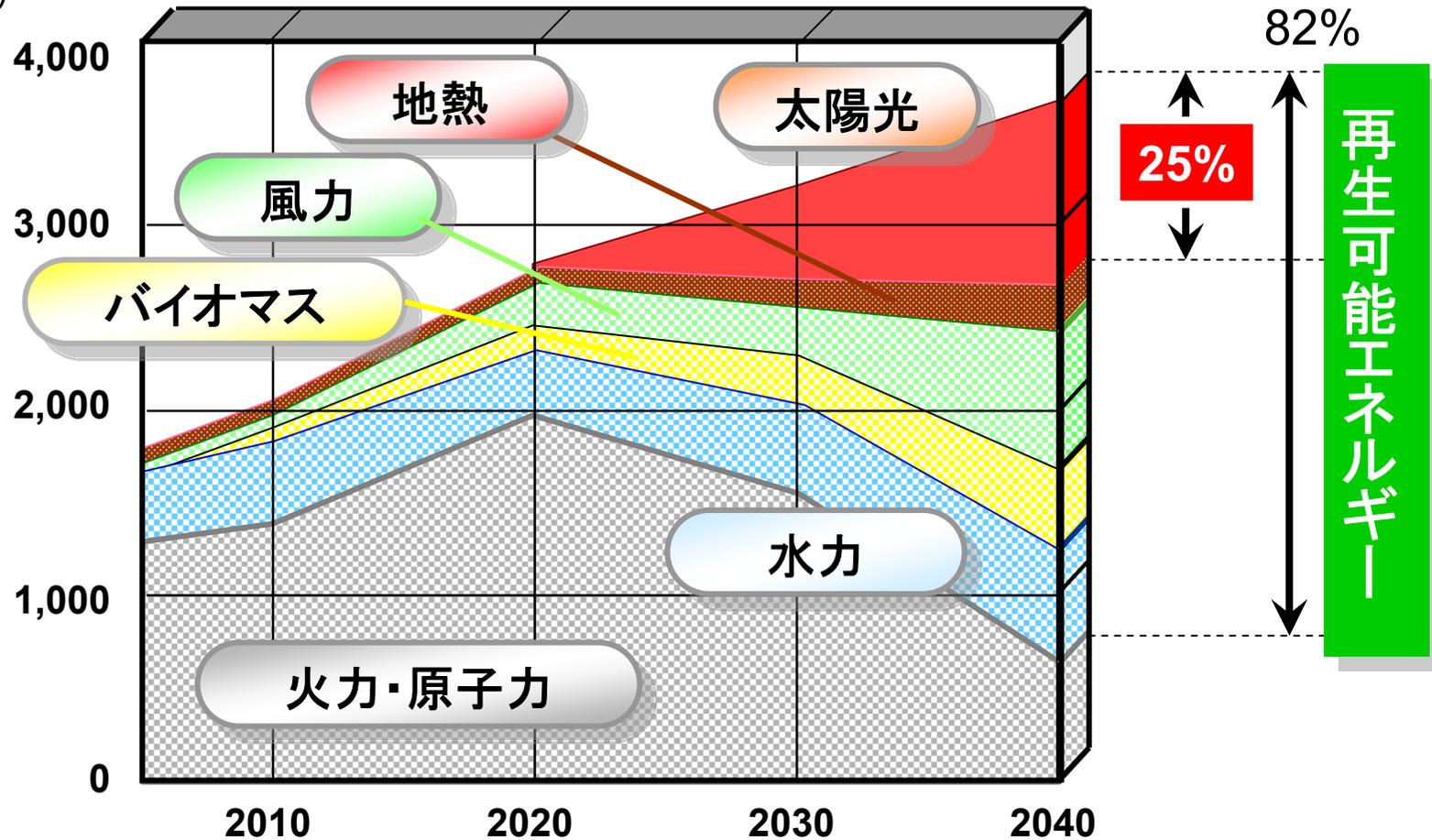


宇宙太陽光発電衛星

太陽光発電は環境対策の中核技術であり
高い成長が期待できる分野

世界の電力供給量

(x10⁷ MWh)



出所: European Renewable Council 資料を基に当社作成

太陽光発電の割合は2040年に25%まで拡大



PVE 基本戦略

当社の事業展開



SHARP

シャープ(株)との共同開発

- ・ 薄膜シリコン太陽電池プラズマCVD装置
- ・ 共同開発・製造・販売



oerlikon
solar

エリコン・ソーラー社との提携

- ・ 薄膜シリコン太陽電池一貫製造ライン
- ・ アジア、オセアニアにおける販売代理店



TEL[®]
東京エレクトロン

自社開発

世界No.1の技術



3事業による相乗効果



中期事業戦略 まとめ

- 半導体製造装置(SPE)
 - ➡ 変化に即応、市場シェア20%獲得を目指す
- フラットパネルディスプレイ製造装置(FPD)
 - ➡ 製品シェア60%以上、将来市場への準備
- 太陽電池製造装置(PVE)
 - ➡ 売上高1,000億円を超える3本目の柱に育成

世界No.1技術 と 顧客第一主義



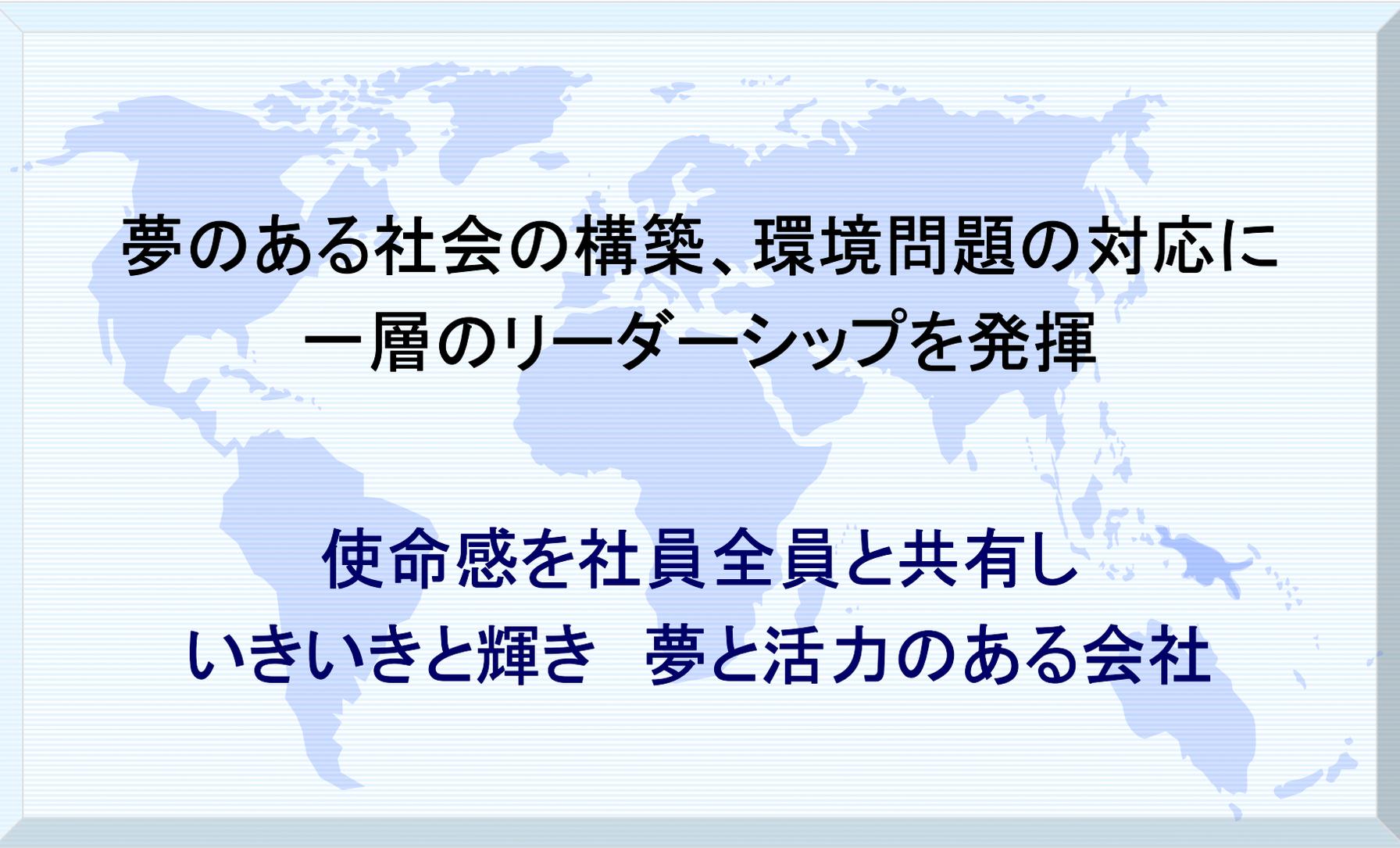
より快適で質の高い生活の実現



今後も技術革新をリードし 社会の発展に貢献



目指す会社像



夢のある社会の構築、環境問題の対応に
一層のリーダーシップを発揮

使命感を社員全員と共有し
いきいきと輝き 夢と活力のある会社



**私たちの技術が
世界を支え、未来を創ります。**



< 決議事項 >

1. 定款一部変更の件
2. 取締役13名選任の件
3. 監査役2名選任の件
4. 第46期取締役賞与金支給の件

第1号議案

定款一部変更の件



<定款変更の概要>

変更の理由	変更する定款の規定
<p>1. 株券電子化に伴う変更</p> <ul style="list-style-type: none"> ・株券の存在を前提とした規定の削除・変更 ・規定削除に伴う条数の繰上げ 	<p>現行定款第7条 現行定款第8条 現行定款第9条 現行定款第11条 現行定款第12条</p>
<p>2. 株券喪失登録簿の作成・備置に関する附則の新設</p> <ul style="list-style-type: none"> ・株券電子化に伴う経過措置 	<p>変更案附則第1条 変更案附則第2条</p>
<p>3. 取締役会・監査役会の招集手続を柔軟に行うための変更</p> <ul style="list-style-type: none"> ・会社法の規定に従って表現を変更 	<p>現行定款第22条 現行定款第30条</p>

第1号議案

1. 株券電子化に伴う規定の変更

現 行 定 款	変 更 案
<p><u>(株券の発行)</u></p> <p>第7条 <u>当社は、株式に係る株券を発行する。</u></p>	<p><u>(全文削除)</u></p>
<p><u>(単元株式数及び単元未満株券の不発行)</u></p> <p>第8条 <u>当社の単元株式数は、100株とする。</u></p> <p>② <u>当社は、前条の規定にかかわらず、単元未満株式に係る株券を発行しない。ただし、株式取扱規程に定めるところについてはこの限りでない。</u></p>	<p><u>(単元株式数)</u></p> <p>第7条 (変更なし)</p> <p><u>(第②項全文削除)</u></p>
<p><u>(株券の種類)</u></p> <p>第9条 <u>当社の発行する株券の種類は、取締役会の定める株式取扱規程による。</u></p>	<p><u>(全文削除)</u></p>



1. 株券電子化に伴う規定の変更

現 行 定 款	変 更 案
<p>(株主名簿管理人)</p> <p><u>第11条</u> 当社は、株主名簿管理人をおく。</p> <p>② 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。</p> <p>③ 当社の<u>株主名簿及び実質株主名簿(以下株主名簿等という。)</u>、<u>新株予約権原簿及び株券喪失登録簿</u>の作成ならびに備え置き、<u>その他の株主名簿、新株予約権原簿及び株券喪失登録簿</u>に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当社においてはこれを取扱わない。</p>	<p>(株主名簿管理人)</p> <p><u>第9条</u> (変更なし)</p> <p>② (変更なし)</p> <p>③ 当社の<u>株主名簿及び新株予約権原簿</u>の作成ならびに備え置き、<u>その他の株主名簿及び新株予約権原簿</u>に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当社においてはこれを取扱わない。</p>

1. 株券電子化に伴う規定の変更

現行定款	変更案
<p>(基準日)</p> <p><u>第12条</u> 当社は、毎事業年度の最終の株主名簿等に記載または記録された株主(実質株主を含む。以下同じ。)をもって、その事業年度に関する定時株主総会において、権利を行使することができる株主とする。</p> <p>② 定款に別段の定めがある場合を除き、必要を認めるときは、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿等に記載または記録された株主または登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主または登録株式質権者とする。</p>	<p>(基準日)</p> <p><u>第10条</u> 当社は、毎事業年度の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において、権利を行使することができる株主とする。</p> <p>② 定款に別段の定めがある場合を除き、必要を認めるときは、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主または登録株式質権者とする。</p>



2. 株券喪失登録簿の備え置きに関する附則の新設

現 行 定 款	変 更 案
<p>(新 設)</p>	<p>(附則)</p> <p>第1条 <u>当会社の株券喪失登録簿の作成及び備え置きその他の株券喪失登録簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。</u></p>
<p>(新 設)</p>	<p>第2条 <u>前条及び本条は、平成22年1月5日まで有効とし、同日の経過をもって前条及び本条を削除する。</u></p>

3. 取締役会・監査役会の招集手続を柔軟に行うための変更

現 行 定 款	変 更 案
<p>(取締役会の招集及び議長)</p> <p>第22条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、あらかじめ取締役会の定めた取締役がこれを招集し議長となる。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により他の取締役がこれに当る。取締役会の招集通知は会日の7日前に発するものとする。ただし、緊急の必要ある場合にはこれを短縮することができる。</p> <p>② 取締役会は、取締役及び監査役全員の同意により、招集の手続を経ないで開催することができる。</p>	<p>(取締役会の招集及び議長)</p> <p>第20条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、あらかじめ取締役会の定めた取締役がこれを招集し議長となる。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により他の取締役がこれに当る。取締役会の招集通知は会日の7日前までに発するものとする。ただし、緊急の必要ある場合にはこれを短縮することができる。</p> <p>② (変更なし)</p>

3. 取締役会・監査役会の招集手続を柔軟に行うための変更

現 行 定 款	変 更 案
<p>(監査役会の招集)</p> <p>第30条 監査役会は、各監査役がこれを招集する。監査役会の招集通知は会日の7日前に発するものとする。</p> <p>ただし、緊急の必要ある場合にはこれを短縮することができる。</p> <p>② 監査役会は、監査役全員の同意により、招集の手続を経ないで開催することができる。</p>	<p>(監査役会の招集)</p> <p>第28条 監査役会は、各監査役がこれを招集する。監査役会の招集通知は会日の7日前までに発するものとする。ただし、緊急の必要ある場合にはこれを短縮することができる。</p> <p>② (変更なし)</p>

第2号議案

取締役13名選任の件



1. 東 哲郎(S24.8.28生)

略歴		当社における地位及び担当
昭和52年 4月	当社入社	代表取締役会長
平成 2年12月	当社取締役	他の法人等の代表状況 Tokyo Electron U.S. Holdings, Inc. 取締役会長 (社)日本半導体製造装置協会 会長
平成 6年 4月	当社常務取締役	
平成 8年 6月	当社取締役社長	
平成15年 6月	当社取締役会長(現在に至る)	
		所有する当社の株式数 35, 028株



2. 常石 哲男 (S27.11.24生)

略歴	
昭和51年 4月	当社入社
平成 4年 6月	当社取締役
平成 8年 6月	当社専務取締役
平成15年 6月	当社取締役副会長(現在に至る)

当社における地位及び担当

取締役副会長

他の法人等の代表状況

Tokyo Electron (Shanghai) Ltd. 取締役会長

Tokyo Electron (Shanghai) Logistic Center Ltd. 取締役会長

所有する当社の株式数

6, 358株



3. 佐藤 潔 (S31.4.2生)

略歴		当社における地位及び担当
昭和54年 4月	当社入社	取締役副会長
平成13年12月	当社クリーントラックBUGM	
平成15年 4月	当社社長付執行役員	所有する当社の株式数
平成15年 6月	当社取締役社長	
平成21年 4月	当社取締役副会長(現在に至る)	
		3,000株

※BUGM=ビジネス ユニット ジェネラルマネージャー



4. 竹中 博司 (S36.2.5生)

略歴		当社における地位及び担当
昭和59年 4月	当社入社	代表取締役社長
平成14年 4月	当社枚葉成膜BUGM	他の法人等の代表状況 Tokyo Electron America, Inc. 取締役会長 Tokyo Electron Europe Ltd. 取締役会長
平成15年 4月	当社執行役員	
平成17年 4月	当社サーマルプロセスシステムBUGM	
平成18年 4月	当社SPE-3事業部 副事業部長	
平成19年 6月	当社取締役	
平成21年 4月	当社取締役社長(現在に至る)	所有する当社の株式数 2,300株

※BUGM=ビジネス ユニット ジェネラルマネージャー



5. 原 護 (S21.8.14生)

略歴		当社における地位及び担当
昭和45年 4月	当社入社	取締役 内部統制担当
平成元年12月	当社取締役	
平成 8年 4月	東京エレクトロン東北(株)専務取締役	
平成 8年 6月	当社取締役退任	
平成11年 3月	東京エレクトロンEE(株)取締役社長	
平成13年 7月	東京エレクトロン デバイス(株)取締役会長	
平成14年 2月	東京エレクトロンAT(株)取締役社長	
平成14年 6月	当社取締役(現在に至る)	
		所有する当社の株式数
		6, 000株



6. 久保寺 正男 (S24.6.21生)

略歴		当社における地位及び担当
昭和54年 1月	当社入社	取締役 技術・開発担当
平成 6年 4月	テル・エンジニアリング(株)取締役	
平成 7年 7月	東京エレクトロン山梨(株)常務取締役	
平成10年 4月	東京エレクトロン宮城(株)取締役社長	
平成13年 4月	東京エレクトロンAT(株)専務取締役	
平成15年 4月	同社取締役会長	
平成16年 6月	当社取締役(現在に至る)	
平成19年 6月	東京エレクトロンAT(株)取締役会長(現在に至る)	
		所有する当社の株式数
		2,552株



7. 岩津 春生 (S25.3.20生)

略歴		当社における地位及び担当
昭和59年11月	当社入社	取締役
平成5年4月	東京エレクトロン九州(株)取締役	
平成10年4月	同社常務取締役	
平成12年1月	当社洗淨システムBUGM	
平成15年4月	東京エレクトロン九州(株)取締役社長	
平成17年6月	当社取締役	
平成18年10月	東京エレクトロン九州(株)取締役会長(現在に至る)	
平成19年6月	当社取締役副社長	
平成21年4月	当社取締役(現在に至る)	
		所有する当社の株式数
		4,700株

※BUGM=ビジネス ユニット ジェネラルマネージャー



第2号議案

第46期定時株主総会

8. 北山 博文(S29.3.28生)

略歴		当社における地位及び担当
昭和58年12月	テル・サームコ(株)入社	取締役 専務執行役員
平成 7年 7月	東京エレクトロン東北(株)取締役	他の法人等の代表状況 東京エレクトロン東北(株) 取締役会長 東京エレクトロンPS(株) 取締役会長 Tokyo Electron Korea Solution Ltd. 取締役会長 Tokyo Electron Taiwan Ltd. 取締役会長
平成11年 3月	東京エレクトロン山梨(株)取締役	
平成15年 4月	東京エレクトロンAT(株)常務執行役員	
平成17年 2月	同社取締役社長	
平成18年 4月	東京エレクトロン東北(株)取締役社長 当社執行役員	
平成19年 6月	当社取締役(現在に至る)	
平成20年10月	東京エレクトロン東北(株)取締役会長(現在に至る)	
平成21年 4月	当社専務執行役員(現在に至る) 東京エレクトロンPS(株)取締役会長(現在に至る)	



9. 鷺野 憲治 (S36.6.7生)

略歴		当社における地位及び担当
昭和59年 4月	当社入社	取締役 専務執行役員
平成15年 4月	当社執行役員、洗浄システムBUGM	他の法人等の代表状況 Tokyo Electron Massachusetts, LLC 取締役会長 TEL Venture Capital, Inc. 取締役会長 TEL Epion Inc.取締役会長
平成17年 4月	当社枚葉成膜BUGM	
平成18年 4月	当社SPE-2事業部 副事業部長	
平成19年 6月	当社取締役(現在に至る)	
平成21年 4月	当社専務執行役員(現在に至る)	

※BUGM=ビジネス ユニット ジェネラルマネージャー



10. 伊東 晃(S36.8.30生)

略歴		当社における地位及び担当
昭和59年 4月	当社入社	取締役 専務執行役員
平成15年 4月	当社執行役員、クリーントラックBUGM	他の法人等の代表状況
平成18年 4月	当社SPE-1事業部 副事業部長	Timbre Technologies, Inc. 取締役会長
平成19年 6月	当社取締役(現在に至る)	所有する当社の株式数
平成21年 4月	当社専務執行役員(現在に至る)	2,100株

※BUGM=ビジネス ユニット ジェネラルマネージャー



11. 中村 隆 (S29.10.6生)

略歴	
昭和54年 4月	当社入社
平成9年10月	東京エレクトロン山梨(株)取締役
平成13年 4月	当社コーポレート・シニア・スタッフ
平成15年 4月	東京エレクトロン ロジスティクス(株)取締役社長
平成15年10月	東京エレクトロンBP(株)取締役社長
平成16年10月	東京エレクトロン九州(株)専務執行役員
平成20年 4月	東京エレクトロンAT(株)専務執行役員
平成21年 4月	当社常務執行役員、コーポレート管理本部長(現在に至る)

所有する当社の株式数
1, 300株



12. 井上 弘(S15.1.5生)

略歴		当社における地位及び担当
昭和38年 4月	(株)東京放送入社	取締役
平成 5年 6月	同社取締役	
平成 8年 6月	同社常務取締役	他の法人等の代表状況
平成 9年 6月	同社専務取締役	
平成13年 6月	同社取締役副社長	(株)東京放送ホールディングス 取締役会長
平成14年 6月	同社取締役社長	(株)TBSテレビ取締役会長
平成18年 6月	当社取締役(現在に至る)	所有する当社の株式数
平成21年 4月	(株)東京放送ホールディングス取締役会長(現在に至る)	
		0株

■ 会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者であります



13. 坂根 正弘(S16.1.7生)

略歴	
昭和38年 4月	(株)小松製作所入社
平成元年 6月	同社取締役
平成 6年 6月	同社常務取締役
平成 9年 6月	同社専務取締役
平成11年 6月	同社取締役副社長
平成13年 6月	同社取締役社長
平成15年 6月	同社取締役社長兼CEO
平成19年 6月	同社取締役会長(現在に至る)
平成20年 6月	当社取締役(現在に至る)

当社における地位及び担当
取締役

他の法人等の代表状況
(株)小松製作所取締役会長

所有する当社の株式数
0株

■ 会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者であります



第3号議案

監査役2名選任の件



1. 本田 祐一 (S22.8.22生)

略歴	
昭和61年 7月	当社入社
平成 6年 6月	当社取締役
平成10年 4月	当社コーポレート・シニア・スタッフ
平成10年 6月	当社取締役退任
平成14年 3月	Tokyo Electron Europe Ltd.取締役
平成17年 6月	当社取締役(現在に至る)

所有する当社の株式数
10,000株



第3号議案

2. 田近 東吾 (S19.10.1生)

略歴	
昭和42年 4月	(株)東京放送入社
昭和62年 7月	同社モスクワ支局長
昭和63年 4月	同社ワシントン支局長
平成 2年10月	同社秘書部副部長
平成 3年 2月	同社秘書部専任部長
平成 4年10月	同社国際室専任部長
平成 7年 6月	同社メディア企画部長
平成 8年 9月	同社総務局広報部長
平成12年 5月	同社メディア国際室局長 Tokyo Broadcasting System International, Inc. 取締役社長
平成16年10月	(株)東京放送経営企画局担当局長 (株)エフ・アンド・エフ常務取締役
平成17年 6月	当社常勤監査役(現在に至る)

当社における地位及び担当

常勤監査役

所有する当社の株式数

0株

- 会社法第2条第16号に定める社外監査役の候補者であります



第4号議案

第46期取締役賞与金支給の件



< 役員報酬体系 >

◆取締役報酬◆



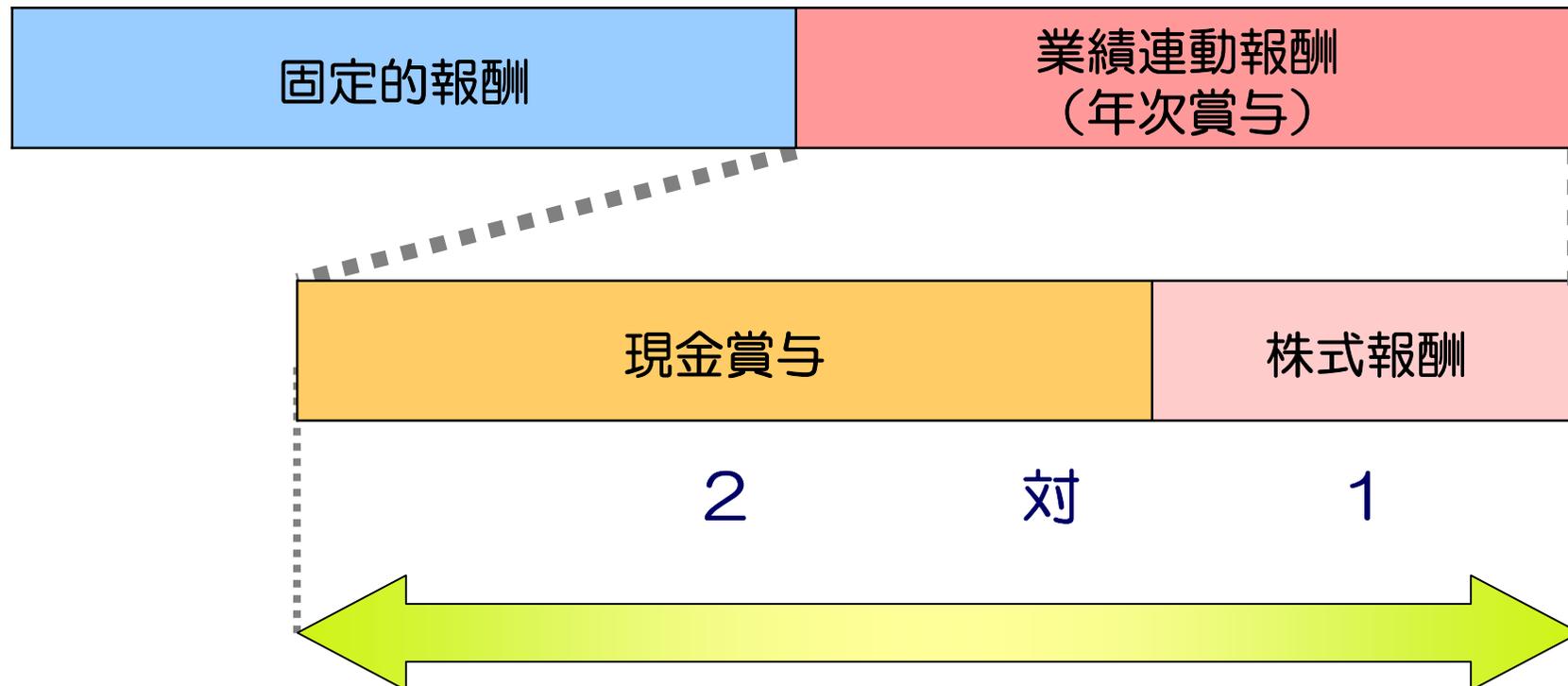
◆監査役報酬◆



◆役員退職慰労金◆ 第43期以降、廃止しております

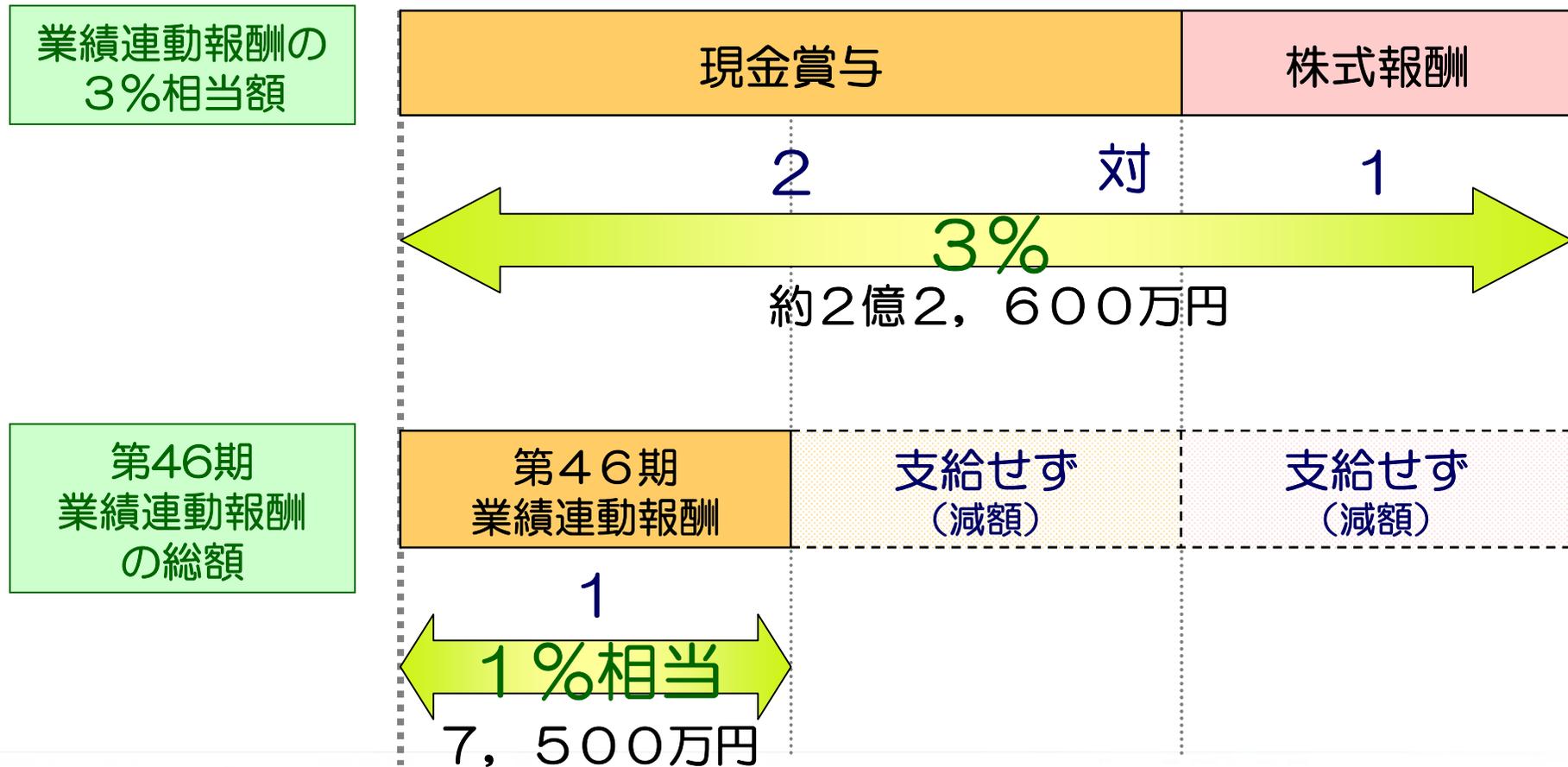
< 業績連動報酬（年次賞与） >

- 対象者
- ①当社取締役、執行役員
 - ②当社国内子会社（公開会社を除く）の取締役、執行役員
 - ③当社海外子会社の会長、社長、副社長
- } 計79名



＜第46期業績連動報酬（年次賞与）について＞

◆第46期の連結当期純利益：75億4300万円



◆第46期の業績連動報酬（年次賞与）

	第46期取締役賞与金
対象者	第46期末時点在籍の取締役14名 (うち社外取締役3名)
報酬額	総額 2,020万円 (うち社外取締役分 75万円)



**私たちの技術が
世界を支え、未来を創ります。**



第1号議案 定款一部変更の件

変更の内容	変更する定款の規定
<p>1. 株券電子化に伴う変更</p> <ul style="list-style-type: none"> ・株券の存在を前提とした規定の削除・変更 ・規定削除に伴う条数の繰上げ 	<p>現行定款第7条 現行定款第8条 現行定款第9条 現行定款第11条 現行定款第12条</p>
<p>2. 株券喪失登録簿の作成・備置に関する附則の新設</p> <ul style="list-style-type: none"> ・株券電子化に伴う経過措置 	<p>変更案附則第1条 変更案附則第2条</p>
<p>3. 取締役会・監査役会の招集手続を柔軟に行うための変更</p> <ul style="list-style-type: none"> ・会社法の規定に従って表現を変更 	<p>現行定款第22条 現行定款第30条</p>

第2号議案 取締役13名選任の件

＜取締役候補者氏名＞

- | | | | | | |
|----|-----|----|-----|----|----|
| 1. | 東 | 哲郎 | 8. | 北山 | 博文 |
| 2. | 常石 | 哲男 | 9. | 鷺野 | 憲治 |
| 3. | 佐藤 | 潔 | 10. | 伊東 | 晃 |
| 4. | 竹中 | 博司 | 11. | 中村 | 隆 |
| 5. | 原 | 護 | 12. | 井上 | 弘 |
| 6. | 久保寺 | 正男 | 13. | 坂根 | 正弘 |
| 7. | 岩津 | 春生 | | | |

第3号議案 監査役2名選任の件

<監査役候補者氏名>

1. 本田 祐一
2. 田近 東吾

第4号議案 第46期取締役賞与金支給の件

	第46期取締役賞与金
対象者	第46期末時点在籍の取締役14名 (うち社外取締役3名)
報酬額	総額 2,020万円 (うち社外取締役分 75万円)



**私たちの技術が
世界を支え、未来を創ります。**



用語集

SPE	Semiconductor Production Equipment	半導体製造装置
FPD	Flat Panel Display Production Equipment	フラットパネルディスプレイ(液晶)製造装置
PVE	Photovoltaic Production Equipment	太陽電池製造装置
ポストセールス	装置販売後の製品本体の保守、移設、改造や消耗部品販売等のアフターサービス事業。	
前工程	半導体製造工程のうち、シリコンウェーハ上に回路を形成する工程。 光学技術、精密加工技術、真空技術、統計工学、プラズマ工学、無人化技術、微細繊維工学、高分子化学、コンピュータプログラミング、環境工学など多岐に渡る技術により構成される。	
微細化	半導体集積回路の加工線幅を細くすること。微細化によって集積回路の集積度を高め、高性能化することができる。また、シリコンウェーハ1枚から取得できるチップ数が多くなるため、微細化すると飛躍的に製造コストを低減でき、価格競争力が高まる。	
低消費電力化	電子部品である半導体素子内部での消費電力を削減すること。	
薄膜シリコン太陽電池	現在主流の結晶シリコン型太陽電池よりシリコン使用量が少なく、製造コストの低減が可能な方式の太陽電池。さらに、今後の技術革新によって変換効率(光を電気に変換する効率)の向上が見込まれている。	
化石燃料	石炭、石油、天然ガスなど、有機物の化石を利用した燃料で、これらは燃やすと二酸化炭素が排出されるため、地球温暖化の原因となっている。また埋蔵量に限りがあるため、資源の枯渇も問題視されている。	
バイオマス燃料	生物体の持つエネルギーを利用したアルコール燃料、その他合成ガスのこと。二酸化炭素の総排出量が増加せず、且つ非枯渇性燃料資源である。	
再生可能エネルギー	自然界に存在し、自然界の営みによって再生されるエネルギー源の総称。 資源の枯渇という問題がなく、地球に優しいとして近年活発に技術革新がおこなわれている。	

